

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juni 2021 (24.06.2021)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2021/119710 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

G01R 29/12 (2006.01) *G01R 29/08* (2006.01)
B81B 7/02 (2006.01) *G02B 26/08* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2020/060478

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. Dezember 2020 (18.12.2020)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A 51104/2019 18. Dezember 2019 (18.12.2019) AT

(71) Anmelder: TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN [AT/AT]; Karlsplatz 13, 1040 Wien (AT). UNIVERSITÄT FÜR WEITERBILDUNG KREMS (DONAU-UN-

IVERSITÄT KREMS) [AT/AT]; Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems/Donau (AT).

(72) Erfinder: KEPLINGER, Franz; c/o Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien (AT). KAINZ, Andreas; c/o Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien (AT). HORTSCHITZ, Wilfried; c/o Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität-Krems), Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30, 3500 Krems/Donau (AT). STEINER, Harald; c/o Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität-Krems), Dr.-Karl-Dorrek-Strasse 30, 3500 Krems/Donau (AT).

(74) Anwalt: SONN & PARTNER PATENTANWÄLTE; Riemergasse 14, 1010 Wien (AT).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SENSING ELECTRIC FIELD

(54) Bezeichnung: METHOD AND DEVICE FOR SENSING ELECTRIC FIELD

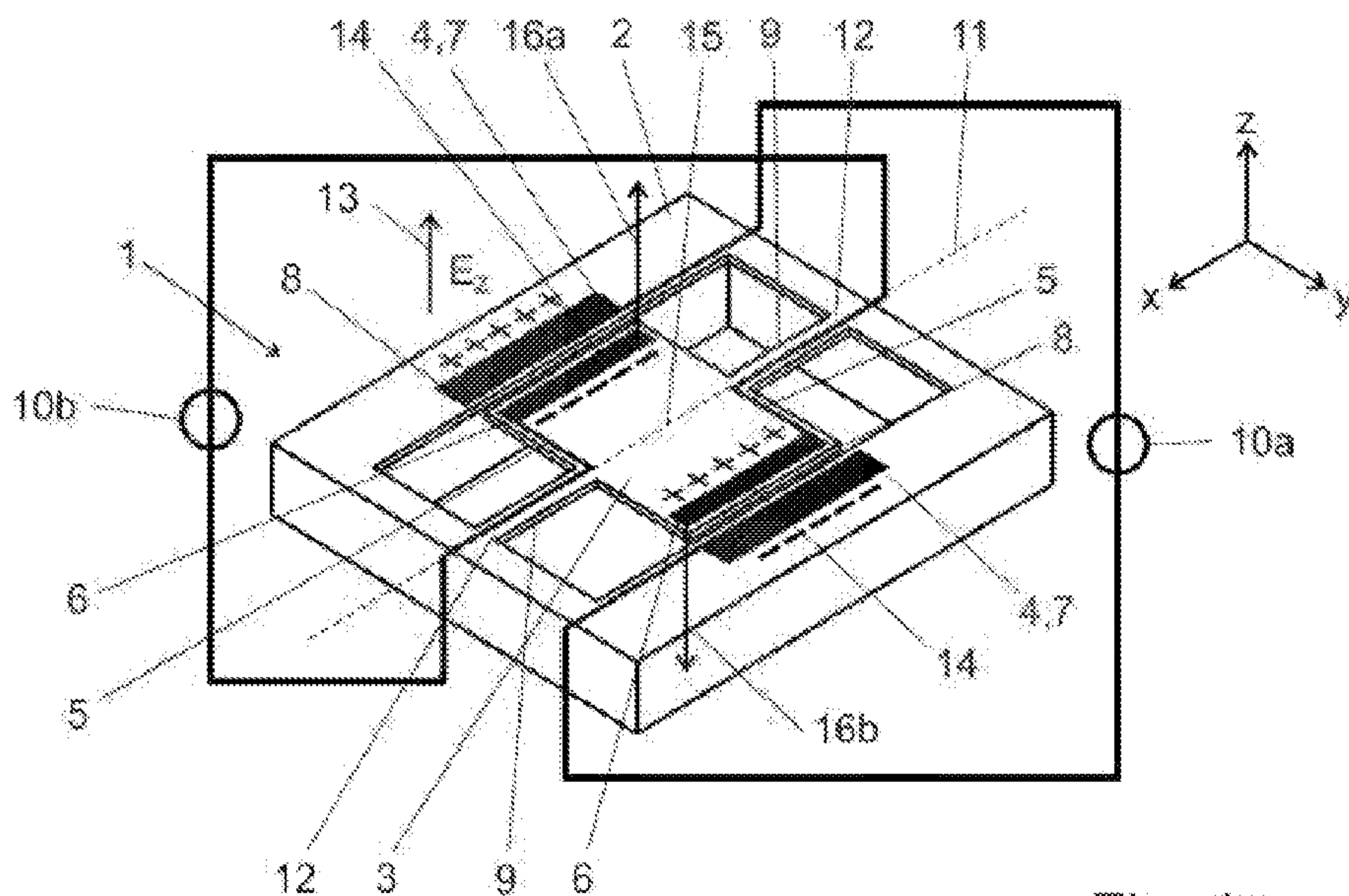


Fig. 1a

(57) Abstract: The invention relates to a sensor (1) for measuring an electric field strength of an electric field (13), having: a base element (2); a sensor element (3) with at least one electrical conductor (5), the sensor element (3) being deflectable out of an idle position into a measuring position by the effect of the electric field (13) on the electrical conductor (5); a counter element (4) with at least one electrically conductive coupling region (7), which is connected to a voltage source (10a), in particular an AC voltage source, for capacitive coupling to a coupling section (6) of the electrical conductor (5) on the sensor element (3), the electrically conductive coupling region (7) on the counter element (4) extending adjacent to the coupling section (6) of the electrical conductor (5) on the sensor element (3) when the sensor element (3) is in the idle state.

(57) Zusammenfassung: Sensor (1) zum Messen einer elektrischen Feldstärke eines elektrischen Feldes (13), aufweisend: ein Basis-



WO 2021/119710 A1

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

element (2), ein Sensorelement (3) mit zumindest einem elektrischen Leiter (5), wobei das Sensorelement (3) durch die Wirkung des elektrischen Feldes (13) auf den elektrischen Leiter (5) von einer Ruheposition in eine Messposition auslenkbar ist, ein Gegenelement (4) mit zumindest einem elektrisch leitfähigen Kopplungsbereich (7), welcher zur kapazitiven Kopplung mit einem Kopplungsabschnitt (6) des elektrischen Leiters (5) am Sensorelement (3) mit einer Spannungsquelle (10a), insbesondere einer Wechselstrom-Spannungsquelle, verbunden ist, wobei sich der elektrisch leitfähige Kopplungsbereich (7) am Gegenelement (4) im Ruhezustand des Sensorelements (3) benachbart des Kopplungsabschnitts (6) des elektrischen Leiters (5) am Sensorelement (3) erstreckt.

METHOD AND DEVICE FOR SENSING ELECTRIC FIELD

Die Erfindung betrifft einen Sensor zum Messen einer elektrischen Feldstärke eines elektrischen Feldes, welcher ein Basiselement und ein Sensorelement mit zumindest einem elektrischen Leiter aufweist, wobei das Sensorelement durch die Wirkung des elektrischen Feldes auf den elektrischen Leiter von einer Ruheposition in eine Messposition auslenkbar ist.

Die elektrische Feldstärke ist eine der fundamentalen physikalischen Größen, deren quantitative Messung, vor allem bei niedrigen Frequenzen oder statischen Feldern, schwierig ist. Ein Grund dafür ist die leichte Störbarkeit des Feldes durch die Messung selbst. Insbesondere führen geerdete Zuleitungen und metallische Komponenten zu einer starken Verzerrung des elektrischen Feldes. Statische und niederfrequente Felder können nur in wohldefinierten Umgebungen gemessen werden, was eine Messung eines solchen Feldes vor Ort, wie zum Beispiel in Hochspannungsanlagen, sehr schwierig gestaltet.

Eine störungsfreie Messung der elektrischen Feldstärke kann aber durchaus wichtig sein. Beispielsweise ist die Kenntnis der Feldstärke für Warneinrichtungen unabdingbar, welche vor Hochspannungen in Energieversorgungseinrichtungen, vor einem drohenden Blitzschlag oder vor elektrostatischen Ladungen warnen. Derartige Warneinrichtungen können stationär bei Anlagen mit Gefährdungspotenzial, beispielsweise bei Krananlagen, bei Hochspannungsleitungen, zur Blitzwarnung bei Flughäfen, oder bei Getreide- oder Holzverarbeitungsanlagen, verbaut werden. Im Bereich des Arbeitnehmerschutzes ist eine mobile Anwendung solcher Warnsysteme gefragt. Diese können beispielsweise an der Arbeitskleidung oder an einem Helm angebracht werden und können auch zukünftig der Überwachung der Einhaltung von Expositionsgrenzwerten für elektrische Felder dienen. Eine mobile Verwendung erfordert eine kompakte Ausführungsform, sollte frei von der Notwendigkeit einer Kalibrierung sein und sollte auch nicht durch schwer beeinflussbare Umweltparameter, wie beispielsweise Temperatur, beeinflusst werden.

Für die Messung elektrischer Felder wurden bisher unter anderem

Feldmühlen verwendet. Diese basiert auf der Änderung eines Elektrodenpotenzials, welches durch das elektrische Feld beeinflusst wird. Um eine messbare Änderung zu erzeugen, muss die Elektrode regelmäßig mit einer weiteren Elektrode, die auf Masse liegt, abgeschirmt werden. Diese Abschirmung erzeugt eine massive Feldverzerrung, welche aufwändige ortsabhängige Kalibrier- und Kompensationsvorgänge nötig macht.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung elektrooptischer Sensoren. Deren Kernelement ist ein Kristall, der seine optischen Eigenschaften in Abhängigkeit der auf ihn wirkenden elektrischen Feldstärke ändert. Diese Sensoren erzeugen keine Verzerrung des elektrischen Feldes, weisen aber eine starke Querempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen auf.

Weiters existieren auch potenzialfreie elektrische Messsysteme, die ohne geerdete Komponenten auskommen, aber relativ große Messelektroden aufweisen. Gemessen wird die Spannung die zwischen den Elektroden im Feld entsteht. Durch ihre Größe ist eine mobile Verwendung stark eingeschränkt und eine (quasi) punktförmige Messung nicht möglich.

Eine weitere Möglichkeit der Messung besteht in der Verwendung mikromechanischer Strukturen, die aus zwei elektrisch leitfähigen Elementen bestehen. Im elektrischen Feld wird in diese eine Ladung beeinflusst und es entsteht eine Anziehung zwischen den beiden Elementen. Einer der beiden Teile ist dabei beweglich gelagert und kann sich verschieben. Diese Verschiebung wird ausgelesen und daraus die elektrische Feldstärke ermittelt. Das System hat jedoch den Nachteil, dass es bei geringen Feldstärken überproportional unempfindlich ist und die Richtungsinformation des Feldes verloren geht. Darüber hinaus erzeugen Wechselfelder einen konstanten Anteil, der das Vorhandensein eines Gleichfeldes vortäuscht.

Aus dem Artikel *Liyanage, S.; Shafai, C.; Chen, T.; Rajapakse, A. „Torsional Moving Electric Field Sensor with Modulated Sensitivity and without Reference Ground“, Proceedings 2017, 1, 350* ist ein Sensor bekannt, der die oben genannten Probleme reduziert. Dieser Sensor besteht aus einem plättchenförmigen Sensor-

element rechteckiger Grundfläche. Auf das Sensorelement sind großflächig zwei leitfähige, voneinander elektrisch isolierte Elektroden aufgebracht. Weiters ist der Sensor an zwei gegenüberliegenden Seiten verschwenkbar gelagert. Die beiden Elektroden befinden sich jeweils auf unterschiedlichen Seiten der Schwenkachse. Die Elektroden verfügen über jeweils einen Anschluss. Beide Anschlüsse sind über jeweils eine Lagerstelle nach außen geführt. An den beiden Elektroden wird für die Messung eine Spannung angelegt, die Ladungen in die Elektroden einprägt. Wenn sich das Sensorelement mit den eingepprägten Ladungen in einem elektrischen Feld befindet, wirkt durch das Feld eine Kraft auf die Ladungen. Durch das jeweils unterschiedliche Vorzeichen der Ladung in den Elektroden wirkt die Kraft für jede Elektrode in eine entgegengesetzte Richtung parallel zum Feld. Diese Kräfte bewirken nun eine Drehung des Sensorplättchens, welche proportional zur elektrischen Feldstärke ist. Diese Drehung wird in weiterer Folge optisch ausgelesen und daraus auf die Feldstärke rückgeschlossen. Selbst dieser Sensor weist jedoch eine eher geringe Messgenauigkeit auf. Weiters kann es zu Verzerrungen des zu messenden Feldes kommen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen Sensor zur Messung der Feldstärke eines elektrischen Feldes vorzuschlagen, welcher die Nachteile des Standes der Technik vermeidet oder zumindest reduziert. Die Erfindung setzt sich insbesondere zum Ziel, eine höhere Messgenauigkeit zu erreichen und eine Verzerrung des zu messenden Feldes zu minimieren.

Dies Aufgabe wird durch einen Sensor mit den Merkmalen aus Anspruch 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 17 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Der erfindungsgemäße Sensor umfasst daher zumindest ein Gegenelement mit zumindest einem elektrisch leitfähigen Kopplungsbereich, welcher zur kapazitiven Kopplung mit einem Kopplungsabschnitt des elektrischen Leiters am Sensorelement mit einer Spannungsquelle, insbesondere einer Wechselstrom-Spannungsquelle, verbunden ist, wobei sich der elektrisch leitfähige Kopplungsbereich am Gegenelement im Ruhezustand des Sensorelements

benachbart des Kopplungsabschnitts des elektrischen Leiters am Sensorelement erstreckt.

Zum Messen der elektrischen Feldstärke kann die Auslenkung des Sensorelements erfasst werden. Diese Auslenkung resultiert aus der Kraft auf die Ladungsträger des elektrischen Leiters im äußeren elektrischen Feld. Die resultierende Kraft kann nach der Formel

$$F = Q \times E$$

berechnet werden, wobei F die Kraft, Q die Ladung und E die elektrische Feldstärke ist, welche auf die Ladung Q wirkt. Somit ist die Kraft proportional zur Ladung und zur Feldstärke. Je nach Ausführungsform des Sensors ruft diese Kraft eine entsprechende Auslenkung des Sensorelements hervor, beispielsweise eine Verdrehung des Sensorelements um seine Längsachse, eine Aufwärts- oder Abwärtsverbiegung, eine Durchbiegung oder eine transversale Verschiebung des Sensorelements. Das Sensorelement ist vorzugsweise elastisch am Basiselement gelagert, so dass eine Rückstellkraft auf das Sensorelement wirkt, welche im Wesentlichen proportional zur Auslenkung des Sensorelements aus der Ruheposition ist. Die Ruheposition bezieht sich dabei auf die Stellung des Sensorelements in Abwesenheit des äußeren elektrischen Feldes, d.h. im unbelasteten Zustand. Für die Messung der Feldstärke ist insbesondere das Drehmoment entscheidend, welches auf das Sensorelement oder seine Verbindungen mit dem Basiselement wirkt.

Erfindungsgemäß ist eine kapazitive Kopplung zwischen dem Kopplungsabschnitt am Sensorelement und dem Kopplungsbereich am Gegenelement vorgesehen. Zu diesem Zweck verläuft der Kopplungsbereich am Gegenelement benachbart, d.h. in unmittelbarer Nähe des Kopplungsabschnitts am Sensorelement. Der Vorteil der kapazitiven Kopplung des Kopplungsabschnitts des Sensorelements mit dem benachbarten Kopplungsbereich des Gegenelements liegt darin, dass aufgrund der dadurch entstehenden Kapazität C die eingeprengte Ladung im Kopplungsabschnitt am Sensorelement gemäß der Formel

$$Q = C \times U,$$

erhöht wird, wobei Q die Ladung, C die Kapazität und U die angelegte Spannung ist. Somit wird eine stärkere Kraft auf das Sen-

sorelement ausgeübt, wodurch das Ausmaß der Auslenkung des Sensorelements erhöht wird. Vorteilhafterweise kann so die Messgenauigkeit bei der Messung des elektrischen Feldes verbessert werden.

Die Spannungsquelle, welche insbesondere eine Wechselstrom-Spannungsquelle ist, ermöglicht es dabei, die eingeprägte Ladungsmenge an die zu messende Feldstärke anzupassen, was eine Vergrößerung des Messbereiches zulässt. Die Verwendung einer Wechselstrom-Spannungsquelle ermöglicht eine resonante Messung des elektrischen Feldes, wodurch die Messung eines statischen elektrischen Feldes mit besonders hoher Genauigkeit ermöglicht wird.

Das Sensorelement ist beweglich an dem Basiselement gelagert. Als Basiselement ist bevorzugt ein Plättchen vorgesehen. Das Gegenelement kann unbeweglich oder beweglich bezüglich des Basiselements angeordnet sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich der Kopplungsbereich am Gegenelement im Wesentlichen parallel zum Kopplungsabschnitt des elektrischen Leiters am Sensorelement. Dadurch wird die kapazitive Kopplung verstärkt. Bevorzugt beträgt der Normalabstand zwischen dem Kopplungsbereich am Gegenelement und dem Kopplungsabschnitt am Sensorelement (bezogen auf die einander zugewandten Längsränder von Kopplungsbereich bzw. -abschnitt) weniger als 10 μm , besonders bevorzugt weniger als 1 μm .

Um den elektrischen Leiter am Sensorelement zumindest entlang des Kopplungsabschnitts in die Nähe des Kopplungsbereichs am Gegenelement führen zu können, ist es besonders bevorzugt, wenn der Kopplungsabschnitt am Sensorelement und der Kopplungsbereich am Gegenelement an einander zugewandten Rändern des Sensor- bzw. Gegenelements verlaufen. Somit ist zwischen den einander zugewandten Rändern des Sensor- bzw. Gegenelements ein Spalt ausgebildet, welcher bevorzugt eine Spaltbreite von weniger als 10 μm , insbesondere weniger als 1 μm (Mikrometer) aufweist. Dadurch kann die Kapazität besonders stark erhöht werden. Somit ist der kleinstmögliche Abstand zwischen dem Kopplungsbereich am Gegenelement und dem Kopplungsabschnitt am Sensorelement durch die

Spaltbreite festgelegt. Durch die Nähe von Kopplungsbereich und Kopplungsabschnitt ist es möglich, die leitfähigen Flächen zu verringern, ohne eine starke Minderung der Kapazität in Kauf nehmen zu müssen. Vorzugsweise wird der Teil der leitfähigen Fläche reduziert, der den größten Abstand zum Spalt aufweist und den kleinsten Einfluss auf die Kapazität hat. Eine Verringerung der Ausmaße der leitfähigen Materialien im Messvolumen führt zu einer geringeren Feldverzerrung und dadurch zu einer erhöhten Genauigkeit der Messung.

Gemäß einem besonderen Merkmal bilden der Kopplungsbereich am Gegenelement und der Kopplungsabschnitt am Sensorelement eine Interdigitalstruktur aus. Diese Interdigitalstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass der Kopplungsbereich am Gegenelement und der Kopplungsabschnitt am Sensorelement ineinandergreifende Finger aufweist. Dadurch vergrößert sich die effektive Länge der Kopplungsstrecke, entlang welcher der Kopplungsbereich am Gegenelement benachbart des Kopplungsabschnitts am Sensorelement verläuft. Vorteilhafterweise kann so die Kapazität aufgrund der kapazitiven Kopplung weiter erhöht werden, ohne dabei die mechanischen Eigenschaften des Sensorelements, wie beispielsweise die Resonanzfrequenz, wesentlich zu verändern.

In einer Ausführungsform des Sensors ist das Gegenelement in der Ruheposition des Sensorelements im Wesentlichen in derselben Ebene wie das Sensorelement angeordnet. Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass die Herstellung des Sensors, beispielsweise als „Micro-Electro-Mechanical System“ (kurz MEMS), sehr einfach ist, da sie in wenigen Schritten aus einem Grundelement hergestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Abstand zwischen dem Kopplungsbereich am Gegenelement und dem Kopplungsabschnitt am Sensorelement kleiner als die größtmögliche Auslenkung des Sensorelements in der Messposition sein kann.

In einer weiteren Ausführungsform ist das Gegenelement in der Ruheposition des Sensorelements im Wesentlichen parallel und in einem Normalabstand zu dem Sensorelement angeordnet. Dies ermöglicht eine Anordnung, in der sich das Sensorelement im Wesentlichen über dem Gegenelement befindet. Durch die bessere Überdeckung von Kopplungsbereich am Gegenelement und Kopplungsab-

schnitt am Sensorelement kann eine hohe Kapazität erzielt werden.

In einer weiteren Ausführungsform ist das Sensorelement an zwei gegenüberliegenden Enden mit dem Basiselement verbunden. Vorzugsweise sind die Verbindungen zwischen dem Sensorelement und dem Basiselement federnd ausgebildet, so dass die Auslenkung des Sensorelements zu einer entsprechenden Rückstellkraft führt. Eine Verbindung des Sensorelements an zwei gegenüberliegenden Enden hat den Vorteil, dass der Sensor weniger empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen, wie beispielsweise eine Bewegung, insbesondere Beschleunigung, ist. Somit ist eine genauere Messung bei mobilem Einsatz des Sensors möglich.

In einer weiteren Ausführungsform ist das eine Ende des Sensorelements mit dem Basiselement verbunden, wobei das andere Ende des Sensorelements frei auskragt. Bei dieser Ausführungsform ist das Sensorelement als Kragteil ausgebildet. Durch die Verbindung des Sensorelements an nur einer Seite mit dem Basiselement ist es möglich, das freistehende Ende in unterschiedlichen Formen auszuführen. Dadurch können die mechanischen Eigenschaften des Sensors an unterschiedliche Eigenschaften des zu messenden elektrischen Feldes, beispielsweise hinsichtlich eines elektrischen Gleichfeldes oder eines niederfrequenten Wechselfeldes, oder an unterschiedliche Einsatzbedingungen, beispielsweise für eine mobile Anwendung, angepasst werden.

In einer weiteren Ausführungsform weist das Sensorelement eine T-, U- oder balkenförmige Grundform auf, wobei an der T-, U- oder balkenförmigen Grundform eine Interdigitalstruktur ausgebildet sein kann. Die T-förmige Grundstruktur ermöglicht es, die Spaltlänge zwischen der Kopplungsstrecke und somit die Kapazität zu erhöhen, ohne die mechanischen Eigenschaften des Sensors, insbesondere die Resonanzfrequenz, zu verändern. Auch die U-förmige Ausführungsform hat zum Ziel, die Kapazität durch die Verlängerung der Kopplungsstrecke zu erhöhen. Die Balkenstruktur ist konstruktiv besonders einfach, wodurch die Fertigung des Sensors erleichtert wird. Um die Kapazität bei diesen Ausführungsformen zu erhöhen, ist es vorteilhaft, wenn das Sensorelement und das Gegenelement eine Interdigitalstruktur aufweisen.

Hinsichtlich einer besonders einfachen, stabilen und kostengünstigen Ausführung kann das Gegenelement einteilig mit dem Basiselement ausgebildet sein. Bei dieser Ausführungsform bildet das Gegenelement daher einen Abschnitt des Basiselements.

In einer weiteren Ausführungsform ist das Gegenelement beweglich am Basiselement gelagert. Dadurch kann die mechanisch unabhängige Auslenkung von Gegen- und Sensorelement für die Ermittlung der elektrischen Feldstärke herangezogen werden. Vorteilhafterweise kann so eine höhere Genauigkeit der Messung erzielt werden. Weiters kann eine Fehlererkennung durchgeführt werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Sensorelement zwei elektrische Leiter und das Gegenelement zwei elektrisch leitfähige Kopplungsbereiche auf, wobei sich die Kopplungsbereiche am Gegenelement benachbart der Kopplungsabschnitte der elektrischen Leiter am Sensorelement erstrecken. Durch diese Ausführungsform entstehen zwei Kapazitäten, die beispielsweise an gegenüberliegenden Seiten des Sensorelements angeordnet sein können. Dadurch ist es möglich, die beiden Kopplungsabschnitte, in denen jeweils eine Ladung eingepreßt ist, am Sensorelement örtlich voneinander zu trennen und dennoch einen großen Kapazitätswert beizubehalten. Außerdem können die Flächen von Kopplungsabschnitt und Kopplungsbereich reduziert werden, wodurch die Verzerrung des zu messenden elektrischen Feldes minimiert wird.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist der elektrische Leiter am Sensorelement mit einer weiteren Spannungsquelle, insbesondere einer Wechselstrom-Spannungsquelle, verbunden. Bei dieser Ausführungsform wird die Ladung durch die weitere Spannungsquelle in den Kopplungsabschnitt des Sensorelements eingepreßt. Vorzugsweise ist das so am Kopplungsabschnitt angelegte Potenzial unterschiedlich zu jenem des benachbarten Kopplungsbereiches des Gegenelements. Durch die entstehende Potentialdifferenz zwischen dem Kopplungsabschnitt am Sensorelement und dem Kopplungsbereich am Gegenelement in Kombination mit der kapazitiven Kopplung weist der Kopplungsabschnitt des Sensorelements eine größere Ladung auf, was die Messgenauigkeit des Sensors erhöht.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das Sensorelement zwei elektrische Leiter auf, welche mit weiteren Spannungsquellen unterschiedlichen Vorzeichens verbunden sind. Diese Ausführungsform weist eine kapazitive Kopplung der beiden elektrischen Leiter auf dem Sensorelement auf, was eine Erhöhung der eingepprägten Ladung zur Folge hat. Vorzugsweise ist diese Ausführungsform damit verbunden, dass das Sensorelement an zwei gegenüberliegenden Seiten mit dem Basiselement verbunden ist, und sich die beiden Kopplungsabschnitte am Sensorelement auf gegenüberliegenden Längsseiten (bezogen auf die Verbindungslinie zwischen den beiden Verbindungen des Sensorelements mit dem Basiselement) befinden. Durch die Verbindung der elektrischen Leiter mit Spannungsquellen unterschiedlichen Vorzeichens sind in den Kopplungsabschnitten Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens eingeppräggt. Wenn sich das Sensorelement in einem elektrischen Feld befindet, wirken auf die unterschiedlichen Ladungen unterschiedliche Kräfte und es kommt zu einer rotatorischen Auslenkung des Sensorelements um die Verbindungslinie. Ein Vorteil einer solchen Rotation proportional zur elektrischen Feldstärke liegt darin, dass bei einer überlagerten Auslenkung durch eine translatorische Bewegung, insbesondere Beschleunigung, des gesamten Sensorelements, dieser Anteil leichter von dem zur Feldstärke proportionalen Anteil getrennt werden kann. Vorzugsweise sind bei dieser Ausführung die Kopplungsbereiche am Gegenelement derart mit der Spannungsquelle verbunden, dass jeweils benachbarte Kopplungsbereiche am Gegenelement und Kopplungsabschnitte am Sensorelement unterschiedliche Potenziale aufweisen. Auch hier führt die so gebildete Potenzialdifferenz in Kombination mit der erfindungsgemäßen kapazitiven Kopplung zu erhöhten Ladungsdichten in den Kopplungsabschnitten des Sensorelements.

In einer weiteren Ausführungsform ist die weitere Spannungsquelle dazu eingerichtet, eine Ladung im elektrischen Leiter des Sensorelements durch Influenz einzuppräggen. Bei dieser Ausführungsform sind bevorzugt zwei Kopplungsbereiche am Gegenelement vorgesehen, in die mit der verbundenen Spannungsquelle unterschiedliche Potenziale eingeppräggt sind. Bevorzugt sind zwei Kopplungsabschnitte am Sensorelement vorgesehen, welche vorzugsweise die gleiche Form und die gleichen Längen wie die elek-

trisch leitfähigen Kopplungsbereiche des Gegenelements aufweisen und elektrisch miteinander verbunden sind. Die Kopplungsabschnitte des Sensorelements befinden sich im elektrischen Feld der Kopplungsbereiche des Gegenelements, wodurch, aufgrund der kapazitiven Kopplung eine Ladungsträgerverschiebung hervorgerufen wird. Auf diese Weise wird in den einen Kopplungsabschnitt eine positive Ladung und in den anderen Kopplungsabschnitt eine negative Ladung eingeprägt. Bei dieser Ausführungsform ist es nicht nötig, elektrische Leiter über die Verbindungsstellen des Sensorelements mit dem Basiselement nach außen zu führen, so dass die Verbindungselemente besonders dünn ausgeführt werden können. Dadurch kann eine geringere Rückstellkraft der federnden Lagerung erzielt werden, wodurch eine größere Auslenkung bei gleicher Feldstärke herbeigeführt werden kann.

Bei einer Ausführungsform ist eine Vakuumeinheit zur Anordnung des Sensorelements und des Gegenelements in einem Vakuum vorgesehen. Um die Messgenauigkeit für geringe Feldstärken zu erhöhen, ist es vorteilhaft, hohe Spannungen am Kopplungsabschnitt des Sensorelements und am Kopplungsbereich des Gegenelements anzubringen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Breite des Spaltes zwischen Sensorelement und Gegenelement zu verringern. Durch diese Maßnahmen wird jedoch die Gefahr eines Durchschlages zwischen den benachbarten und mit verschiedenen Potentialen versehenen Bereichen erhöht. Die Ausführungsform mit Vakuumeinheit minimiert in beiden Fällen das Risiko eines Durchschlages und erlaubt somit Messungen mit höherer Genauigkeit.

Vorzugsweise weist der Sensor eine Auswerteeinheit zur Erfassung der Auslenkung des Sensorelements in der Messposition auf, wobei die Auswerteeinheit bevorzugt zur optischen, piezoelektrischen, piezoresistiven, resistiven oder kapazitiven Erfassung der Auslenkung des Sensorelements eingerichtet ist. Mit einer optischen Auswerteeinheit ist es möglich, auch kleinste Bewegungen noch sehr genau zu erfassen. Besonders bevorzugt werden dabei interferometrische Messmethoden verwendet. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Auslenkung des Sensorelements aus der Kapazität zwischen dem Sensorelement und dem Gegenelement zu ermitteln. Durch die Abhängigkeit der Kapazität von der relativen Lage des Sensorelements zum Gegenelement, und damit von der Aus-

lenkung, kann durch die Erfassung der Kapazität auf die zu messende Feldstärke geschlossen werden. Zur Integration einer Auswerteeinheit in den Sensor können weiters piezoresistive oder piezoelektrische Materialien an Stellen des Sensors vorgesehen sein, welche in der Messposition eine Verformung aufweisen. Durch die Messung der Spannung aufgrund der Verformung des piezoelektrischen Materials oder durch die Widerstandsänderung am piezoresistiven Material kann auf die Auslenkung und somit auf die zu messende elektrische Feldstärke geschlossen werden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von besonders bevorzugten Ausführungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein soll, und unter Bezugnahme auf die Zeichnungen noch weiter erläutert.

Fig. 1a bis 1c zeigen eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Sensors, bei welcher eine kapazitive Kopplung zwischen einem beweglichen Sensorelement und einem statischen Gegenelement vorgesehen ist.

Fig. 1d zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors, bei welcher die Ladung im Sensorelement durch Influenz eingepreßt wird.

Fig. 1e zeigt eine Variante des Sensors der Fig. 1a bis 1c mit einer Interdigitalstruktur.

Fig. 1f und Fig. 1g zeigen eine weitere Ausführungsform des Sensors, bei welcher das Sensorelement im äußeren elektrischen Feld seitlich (transversal) verschoben wird.

Fig. 2a zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors, bei welcher ein balkenförmiges Sensorelement vorgesehen ist.

Fig. 2b zeigt eine Variante des Sensors nach Fig. 2a mit einer Interdigitalstruktur.

Fig. 3a zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors mit einem balkenförmigen Sensorelement und nur einem Kopplungsabschnitt.

Fig. 3b zeigt den Sensor nach Fig. 3a in einer Variante mit In-

terdigitalstruktur.

Fig. 4a bis 4c zeigen verschiedene Ausführungsformen des Sensors mit einem U-förmigen Sensorelement, welches einseitig mit dem Basiselement verbunden ist.

Fig. 5a und 5b zeigen die Sensoren der Fig. 4a bzw. Fig. 4c in einer Variante mit Interdigitalstruktur.

Fig. 6a zeigt eine Ausführungsform des Sensors mit einem balkenförmigen Sensorelement, welches einen Kopplungsabschnitt aufweist und einseitig mit dem Sensorelement verbunden ist.

Fig. 6b zeigt den Sensor nach Fig. 6a in einer Variante mit Interdigitalstruktur.

Fig. 7a zeigt eine Ausführungsform des Sensors mit einem balkenförmigen Sensorelement und einem beweglich am Basiselement gelagerten, balkenförmigen Gegenelement.

Fig. 7b zeigt den Sensor der Fig. 7a in einer Variante mit Interdigitalstruktur.

Fig. 8a zeigt eine Ausführungsform des Sensors mit einem T-förmigen Sensorelement, welches einseitig mit dem Basiselement verbunden ist.

Fig. 8b zeigt den Sensor der Fig. 8A in einer Variante mit Interdigitalstruktur.

Fig. 9a und 9b zeigen zwei Ausführungsvarianten einer Auswerteeinheit für die Erfassung der Auslenkung des Sensorelements.

Figur 1a zeigt eine Ausführungsform eines Sensors 1 zur Messung eines äußeren elektrischen Feldes, insbesondere eines elektrischen Gleichfeldes. Der Sensor 1 weist in der gezeigten Variante ein Basiselement 2, ein Sensorelement 3 und zwei Gegenelemente 4 beidseits des Sensorelements 3 auf. Am Sensorelement 3 sind zwei elektrische Leiter 5 aufgebracht, die jeweils einen Kopplungsabschnitt 6 ausbilden. Die Gegenelemente 4 weisen elektrisch leit-

fähige Kopplungsbereiche 7 auf, die zur kapazitiven Kopplung mit den Kopplungsabschnitten 6 des Sensorelements 3 eingerichtet sind. Der Kopplungsbereich 7 am Gegenelement 4 und der Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 verlaufen benachbart und durch einen Spalt 8 voneinander getrennt. Das Sensorelement 3 ist mit dem Basiselement 2 über elastische Verbindungen 9 verbunden. In der gezeigten Ausführung ergibt sich die elastische Lagerung daraus, dass das Sensorelement 3 dünner, insbesondere um ein Mehrfaches dünner, als das Basiselement 2 ist. Die Kopplungsbereiche 7 sind über Verbindungsleitungen mit einer Spannungsquelle 10a verbunden. In der dargestellten Ausführungsform sind die Kopplungsabschnitte 6 über weitere Verbindungsleitungen mit einer weiteren Spannungsquelle 10b verbunden. Je nach Ausführung kann die Spannungsquelle 10a ident zur weiteren Spannungsquelle 10b sein. Beispielsweise können im Betrieb an einen der Kopplungsbereiche 7 der positive Ausgang der Spannungsquelle 10a und an den anderen Kopplungsbereich 7 der negative Ausgang der Spannungsquelle 10b angeschlossen sein. Die Kopplungsabschnitte 6 des Sensorelements 3 sind dabei mit derselben Spannungsquelle 10a so verbunden, dass jeweils ein benachbarter Kopplungsbereich 7 und Kopplungsabschnitt 6 auf unterschiedlichem Potenzial liegen. Durch die kapazitive Kopplung der nebeneinander verlaufenden Kopplungsbereiche 7 und Kopplungsabschnitte 6 und die angelegte Spannung der Spannungsquelle 10a entsteht eine Ladung in den Kopplungsabschnitten 6 gemäß der Formel

$$Q = C \times U.$$

Durch die elastischen Verbindungen 9 kann sich das Sensorelement 3 um eine Verbindungsachse 11 zwischen den Verbindungsstellen 12 verdrehen. Befindet sich der Sensor 1 nun in einem zu messenden elektrischen Feld 13, wirken auf die in den Kopplungsabschnitten 6 eingepprägten Ladungsträger die Kräfte 16a und 16b. Da in den beiden Kopplungsabschnitten 6 Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens eingepprägt sind, wirkt die Kraft 16a auf den einen Kopplungsabschnitt 6 in Richtung des elektrischen Feldes 13, die Kraft 16b auf den anderen Kopplungsabschnitt 6 dem elektrischen Feld 13 entgegen. Durch die Kräfte 16a und 16b und den Abstand d (Fig. 1b) zum Ladungsträgerkonzentrationsschwerpunkt 14 wirkt ein Moment auf das Sensorelement 3. Aufgrund der Anordnung des

Kopplungsbereichs 7 seitlich außerhalb des Kopplungsabschnittes 6 befindet sich der Ladungsträgerschwerpunkt 14 im äußeren Randbereich des Kopplungsabschnitts 6 auf Seite des benachbarten Kopplungsbereichs 7 des Gegenelements 4, wodurch der Abstand d (vgl. Fig. 1b) und somit das Moment maximal sind. Aufgrund der kapazitiven Kopplung zwischen dem Kopplungsbereich 7 am Gegenelement 4 und dem Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 kann auf eine kapazitive Kopplung der beiden Kopplungsabschnitte 6 am Sensorelement 3 verzichtet werden. Somit können die Kopplungsabschnitte 6 nur an den Rändern des Sensorelements 3, hin zu den Spalten 8, ausgebildet sein, wobei der zentrale Bereich 15 des Sensorelements 3 frei elektrisch leitfähigem Material ist. Durch diese Reduktion der leitfähigen Materialien im Bereich des zu messenden elektrischen Feldes 13 wird eine Verzerrung des elektrischen Feldes vermindert.

Fig. 1b zeigt den Sensor 2 aus Figur 1a in einer Draufsicht. Zur Erklärung der Bezugszeichen sei auf die Ausführungen zu Fig. 1a verwiesen.

Fig. 1c zeigt einen Schnitt durch den Sensor 1 entlang der Schnittlinie A-A (siehe Fig. 1b). Hier sind die Kräfte 16a und 16b veranschaulicht, die in einem elektrischen Feld 13 auf das Sensorelement 3 wirken. Durch Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens in den Kopplungsabschnitten 6 wirken die Kräfte 16a und 16b in entgegengesetzte Richtungen, parallel zum elektrischen Feld 13. Die Kräfte 16a und 16b bewegen das Sensorelement 3 von der mit durchgezogenen Linien veranschaulichten Ruheposition in die mit strichlierten Linien angedeutete Messposition. Die Messposition hängt damit von der Stärke des elektrischen Feldes 13 und der Rückstellkraft der elastischen Verbindung 9 ab.

Figur 1d zeigt einen erfindungsgemäßen Sensor 1 in einer weiteren Ausführungsform, wobei das Sensorelement 3 in einem Normalabstand a in einer Ebene über dem Gegenelement 4 angeordnet ist. Die Kopplungsbereiche 7a und 7b sind jeweils mit der Spannungsquelle 10 verbunden, wobei jeder der beiden Kopplungsbereiche 7a, 7b mit einem anderen Ausgang der Spannungsquelle 10a verbunden ist. Dadurch stellt sich zwischen den beiden Kopplungsbereichen 7a und 7b eine Potenzialdifferenz ein. Auf dem

Sensorelement 3 sind, deckungsgleich mit den beiden Kopplungsbereichen 7a, 7b am Gegenelement 4, Kopplungsabschnitte 6a, 6b angeordnet, welche miteinander elektrisch verbunden sind. Die beiden Kopplungsabschnitte 6 sind mit den beiden Kopplungsbereichen 7a, 7b kapazitiv gekoppelt. Das elektrische Koppelfeld, das zwischen den Kopplungsbereichen 7a, 7b durch die Potenzialdifferenz gebildet ist, ruft in den, im Koppelfeld befindlichen, Koppelabschnitten 6a, 6b eine Ladungsträgerverschiebung hervor, so dass in den beiden Koppelabschnitten 6a, 6b gegenpolige Ladungen entstehen (Influenz). Die Größe der influenzierten Ladung hängt dabei von der an den Kopplungsbereichen 7a, 7b angelegten Spannung und der durch die kapazitive Kopplung gebildeten Kapazität ab. Die Entstehung einer Auslenkung ist dabei äquivalent zum Sensor 1 aus Fig. 1a bis 1c, so dass auf die Ausführungen oben verwiesen werden kann. Auch bei anderen Sensorgeometrien, insbesondere gemäß Fig. 1c, können die Ladungsträger am Sensorelement 3 durch Influenz eingepreßt werden.

Fig. 1e zeigt eine Variante des Sensors 1 gemäß den Fig. 1a bis 1c. Bei dieser Ausführungsvariante bilden der Kopplungsbereich 7 und der Kopplungsabschnitt 6 eine Interdigitalstruktur aus. Dazu sind am Sensorelement 3 und am Gegenelement 4 jeweils mehrere Finger 17 vorgesehen, welche ineinandergreifen. Durch die Ausbildung dieser Interdigitalstruktur kann die Länge des Spalts 8, der den Kopplungsabschnitt 6 und den Kopplungsbereich 7 voneinander trennt, verlängert werden, ohne die mechanischen Eigenschaften des Sensorelements 3 nennenswert zu beeinflussen. Durch die Verlängerung des Spalts 8 kann die Koppelkapazität, die zwischen dem Kopplungsabschnitt 6 und dem Kopplungsbereich 7 ausgebildet ist, vergrößert und damit die Messgenauigkeit erhöht werden.

Fig. 1f zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors 1, bei welcher das Sensorelement 3 in einem Normalabstand über dem Gegenelement 4 angebracht ist. Das Sensorelement 3 befindet sich dabei in derselben Ebene wie das Basiselement 2 und ist mit diesem über elastische Verbindungen 9 verbunden. In dieser Ausführungsform sind das Sensorelement 3, das Basiselement 2 und die elastischen Verbindungen 9 aus leitfähigem Material hergestellt und elektrisch verbunden. Das Gegenelement 4 ist ebenso aus ei-

nem leitfähigen Material hergestellt und ist durch einen Isolator 27 mit dem Basiselement 2 verbunden, von diesem jedoch elektrisch isoliert. Die Spaltbreite des Spalts 8 (siehe Fig. 1g) ist dabei über die Dicke des Isolators 27 festgelegt. Der Sensor 1 ist bei dieser Ausführungsform dafür vorgesehen, so in dem elektrischen Feld 13 positioniert zu werden, dass die Feldlinien parallel zum Sensorelement 3 und quer zu den elastischen Verbindungen 9 verlaufen. Das Gegenelement 4 ist mit einer Spannungsquelle 10a verbunden (hier nicht dargestellt), das Sensorelement 3 mit einer weiteren Spannungsquelle 10b (ebenfalls hier nicht dargestellt). Beispielsweise können das Gegenelement 4 und das Sensorelement 3 auch mit unterschiedlichen Polen derselben Spannungsquelle 10a verbunden sein. Durch die Spannungsquelle 10a wird in das Sensorelement 3 nun eine Ladung eingeprägt. Durch die kapazitive Kopplung mit dem Gegenelement 4 wird diese Ladung erhöht. Wenn sich der Sensor 1 nun in einem elektrischen Feld 13 befindet, wird eine Kraft 16a auf die Ladung im Sensorelement 3 ausgeübt, welche eine Auslenkung, in diesem Fall eine transversale Verschiebung, des Sensorelements 3 parallel zum elektrischen Feld 13 hervorruft. Durch die Messung dieser Auslenkung kann auf die Stärke des elektrischen Feldes 13 geschlossen werden.

Fig. 1g zeigt den Sensor 1 aus Figur 1f in einem Querschnitt entlang der Linie A-A.

Fig. 2a zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors 1, bei welcher das Sensorelement 3 als Balken ausgeführt ist. Auf dem Gegenelement 4 sind zwei Kopplungsbereiche 7 und auf dem Sensorelement 3 zwei Kopplungsabschnitte 6 vorgesehen. Die elektrische Beschaltung kann wie bei der Ausführungsform der Fig. 1a bis 1b sein.

Fig. 2b zeigt eine Variante des Sensors der Fig. 2a, bei welcher die Kopplungsabschnitte 6 am Sensorelement 3 und die Kopplungsbereiche 7 am Gegenelement 4 eine Interdigitalstruktur ausbilden. Diese Interdigitalstruktur erhöht einerseits die Kapazität des Sensors zwischen Kopplungsabschnitt 6 und Kopplungsbereich 7, andererseits wird der Ladungsträgerschwerpunkt weiter nach außen (weg von der strichliert eingezeichneten Verbindungsachse)

verschoben und so das auf das Sensorelement 3 wirkende Moment erhöht wird. Gleichzeitig bleibt die einfache Herstellung und die geringe Anfälligkeit auf externe Einflüsse weitestgehend erhalten.

Fig. 3a zeigt einen Sensor 1 mit einem Sensorelement 3, das an zwei gegenüberliegenden Seiten mit dem Basiselement 2 verbunden ist, jedoch nur einen Kopplungsabschnitt 6 aufweist. Am Gegenelement 4 sind zwei Kopplungsbereiche 7 ausgebildet, die miteinander elektrisch verbunden sind. Die Kopplungsbereiche 7 sind mit einer Spannungsquelle 10a verbunden. Bei dieser Ausführungsform ist der Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 mit einer weiteren Spannungsquelle 10b anderen Potentials oder auch mit einem anderen Ausgang der Spannungsquelle 10a verbunden. Die kapazitive Kopplung tritt hier zwischen dem Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 und den beiden Kopplungsbereichen 7 am Gegenelement 4 auf. Wenn sich der Sensor 1 in einem elektrischen Feld 13 befindet, wirkt auf die im Kopplungsabschnitt 6 eingepreßte Ladung eine Kraft 16, die zu einer Ausbeulung des zentralen Bereiches 15 des Sensorelementes 3 führt. Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt wieder in der einfachen Herstellbarkeit und der Robustheit gegenüber externen mechanischen Einflüssen. Da hier eine transversale Bewegung die maßgebende Größe ist, wirkt sich ein externer Einfluss in Form einer Rotation auf das Messergebnis nicht wesentlich aus.

Fig. 3b zeigt im Wesentlichen denselben Sensor 1 wie Fig. 3a, jedoch bilden hier die Kopplungsbereiche 7 am Gegenelement 4 und die Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 eine Interdigitalstruktur aus, die die Kapazität des Sensors und somit die Messgenauigkeit erhöht.

Fig. 4a zeigt einen Sensor 1 mit einem frei auskragenden Sensorelement 3, das einseitig über zwei Verbindungsstellen 12 mit dem Basiselement 2 verbunden ist. Das Sensorelement 3 ist im Wesentlichen U-förmig. Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich der Kopplungsabschnitt 6 im Wesentlichen über den gesamten U-förmigen Außenumfang des Sensorelements 3. Zur kapazitiven Kopplung erstreckt sich der Kopplungsbereich 7 am Gegenelement 4 parallel zum Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3. Der Kopplungsbe-

reich 7 ist mit der Spannungsquelle 10a verbunden. Bei dieser Ausführungsform ist der Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 mit der weiteren Spannungsquelle 10b anderen Potentials oder auch mit einem weiteren Ausgang der Spannungsquelle 10a verbunden. Durch die Potentialdifferenz wird in den Kopplungsabschnitt 6 des Sensorelements 3 eine Ladung eingepreßt. Befindet sich das Sensorelement 3 in einem elektrischen Feld 13, wirkt auf die Ladungsträger eine Kraft 16, die eine Aufwärts- bzw. Abwärtsbiegung des Sensorelements 3 hervorruft.

Fig. 4b zeigt eine abgewandelte Ausführungsform des Sensors 1. Hier befindet sich das Gegenelement 4 im Inneren 18 des Sensorelements 3. Auf das Gegenelement 4 ist der Kopplungsbereich 7 zur kapazitiven Kopplung mit dem Kopplungsabschnitt 6 des Sensorelements 3 aufgebracht. Die elektrische Beschaltung und Auslenkung des Sensorelements 3 entspricht der Ausführungsform der Fig. 4a. Der Vorteil der Ausführungsform der Fig. 4b liegt insbesondere darin, dass die Fläche des elektrisch leitfähigen Kopplungsbereichs 7 vergleichsweise klein ist und dadurch eine geringere Feldverzerrung als bei der Ausführungsform nach Fig. 4a auftritt.

Fig. 4c zeigt eine Ausführungsvariante, bei welcher sowohl innerhalb des Sensorelements 3 (wie bei Fig. 4b) als auch außerhalb des Sensorelements 3 (wie bei Fig. 4a) jeweils ein Gegenelement 4 ausgebildet ist. Beide Gegenelemente 4 weisen jeweils einen Kopplungsbereich auf. Die beiden Kopplungsbereiche 7a, 7b sind mit demselben Potential der Spannungsquelle 10a verbunden. Diese Ausführungsform erhöht die Kapazität des Sensors, was eine genauere Messung ermöglicht.

Die Figuren 5a und 5b zeigen Fig. 4a bzw. Fig. 4c entsprechende Ausführungsformen, wobei hier der Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 und der Kopplungsbereich 7 am Gegenelement 4 eine Interdigitalstruktur ausbilden. Dabei sind am Sensorelement 3 Finger 17 ausgebildet, die sich zwischen entsprechend gestalteten Fingern 17 am Gegenelement 4 erstrecken. Der Kopplungsbereich 7 und der Kopplungsabschnitt 6 sind auf die jeweiligen Finger 17 erweitert. Durch den so länger ausgeführten Spalt 8 wird die Kapazität der Anordnung und somit die Messgenauigkeit erhöht.

Fig. 6a zeigt einen Sensor 1, der ein balkenförmiges Sensorelement 3 aufweist, das nur an einer Seite an einer Verbindungsstelle 12 mit dem Basiselement 2 verbunden ist, wobei das andere Ende des Sensorelements 3 frei auskragt. Am Sensorelement 3 ist der elektrisch leitende Kopplungsabschnitt 6 aufgebracht. Das Sensorelement 3 wird vom Gegenelement 4 umgeben, auf dem der Kopplungsbereich 7 aufgebracht ist, welcher bei dieser Ausführung in Draufsicht U-förmig ist. Der Kopplungsbereich 7 ist mit der Spannungsquelle 10a verbunden. Bei dieser Ausführungsform wird der Kopplungsabschnitt 6 des Sensorelements 3 mit der weiteren Spannungsquelle 10b verbunden, so dass Kopplungsabschnitt 6 und Kopplungsbereich 7 auf unterschiedlichen Potenzialen liegen. Alternativ kann der Kopplungsabschnitt auch an einen weiteren Ausgang anderen Potentials der Spannungsquelle 10a angeschlossen sein. Dadurch wird im Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 eine Ladung eingepreßt, die, wenn sich der Sensor 1 in einem zu messenden elektrischen Feld 13 befindet, eine Auslenkung des Sensorelements 3 bewirkt. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist die einfache Herstellbarkeit und weiters eine größere Empfindlichkeit durch die nur einseitige Verbindung.

Fig. 6b zeigt eine Fig. 6a entsprechende Ausführungsform, wobei zudem der Kopplungsabschnitt 6 am Sensorelement 3 und der Kopplungsbereich 7 am Gegenelement 4 eine Interdigitalstruktur ausbilden. Dabei sind am Sensorelement 3 und am Gegenelement 4 jeweils Finger 17 ausgebildet, die miteinander verzahnt sind. Der Kopplungsabschnitt 6 und der Kopplungsbereich 7 sind jeweils auf die zugehörigen Finger 17 erweitert.

Fig. 7a zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors 1, welcher ein balkenförmiges Sensorelement 3 besitzt, das an einer Seite mit dem Basiselement 2 verbunden ist und auf der anderen Seite frei auskragt. Auf dem Sensorelement 3 ist der Kopplungsabschnitt 6 aufgebracht. Bei dieser Ausführungsform ist auch das Gegenelement 4 mit dem darauf befindlichen Kopplungsbereich 7 beweglich am Basiselement 2 gelagert. Das Gegenelement 4 ist dabei wie das Sensorelement 3 balkenförmig ausgeführt und nur an einer Seite am Basiselement 2 gelagert, wobei die andere Seite frei auskragt. Das Gegenelement 4 ist mit der Spannungsquelle

10a verbunden, wobei das Sensorelement 3 mit der weiteren Spannungsquelle 10b anderen Potentials verbunden ist. Bei dieser Ausführungsform werden sowohl das Sensorelement 3 als auch das Gegenelement 4 in einem elektrischen Feld 13 ausgelenkt. Die Auslenkung der beiden Elemente ist mechanisch unabhängig voneinander. Bei getrennter Erfassung der Auslenkungen können zwei unabhängige Werte pro Messung erhalten werden. Da das Sensorelement 3 und das Gegenelement 4 aufgrund der unterschiedlichen eingepprägten Ladungen in entgegengesetzte Richtungen ausgelenkt werden, kann ein Gleichanteil der Auslenkung, beispielsweise durch eine mechanische Einwirkung, herausgerechnet werden.

Figur 7b zeigt den Sensor nach Fig. 7a, wobei hier der Kopplungsbereich 7 und der Kopplungsabschnitt 6 eine Interdigitalstruktur ausbilden. Das Sensorelement 3 und das Gegenelement 4 weisen dabei ineinandergreifende Finger 17 auf.

Fig. 8a zeigt eine weitere Ausführungsform des Sensors 1, bei welcher an einem frei auskragenden Ende des Sensorelements 3 eine balkenförmige Querstruktur 19 quer zum übrigen Sensorelement 3 vorgesehen ist. Das Sensorelement 3 weist somit eine T-Form auf. Das Gegenelement 4 ist in dieser Ausführungsform um das Sensorelement 3 herum ausgebildet. Auf dem T-förmigen Sensorelement 3 ist der Kopplungsabschnitt 6 vorgesehen, am Gegenelement 4 der Kopplungsbereich 7. Der Kopplungsbereich 7 ist mit der Spannungsquelle 10a verbunden. Der Kopplungsabschnitt 6 ist mit der weiteren Spannungsquelle 10b oder mit einem weiteren Ausgang der Spannungsquelle 10a verbunden. Durch die zusätzliche Kopplungsstrecke entlang der balkenförmigen Querstruktur 19 des Sensorelements 3 verschiebt sich der Ladungsträgerschwerpunkt 14 in Richtung des frei auskragenden Endes des Sensorelements 3, wodurch das auf das Sensorelement 3 wirkende Moment und somit die Auslenkung und Messgenauigkeit erhöht wird.

Fig. 8b zeigt eine abgewandelte Ausführungsform des Sensors 1 der Fig. 8a, bei welcher zwischen Kopplungsabschnitt 6 und Kopplungsbereich 7 eine Interdigitalstruktur ausgebildet ist. Die Finger 17 sind am Sensorelementes 3 jedoch nur an der durchgehenden Außenkante der balkenförmigen Querstruktur 19 vorgesehen, welche die größte Distanz zur Verbindungsstelle 12 aufweist. Den

Fingern 17 des Sensorelements 3 liegen Finger 17 des Gegenelements 4 derart gegenüber, dass die Finger 17 ineinandergreifen und so eine Verzahnung bilden. Durch die Anordnung der Interdigitalstruktur am frei auskragenden Ende des Sensorelements 3 wird der Ladungsträgerschwerpunkt 14 weiter weg von der Verbindungsstelle 12 verschoben, wodurch das auf das Sensorelement 3 wirkende Moment erhöht wird.

Fig. 9a zeigt eine Ausführungsform des Sensors 1 entsprechend Fig. 1a bis 1c mit einer Auswerteeinheit 20 zur optischen Auswertung der Auslenkung des Sensorelements 3. Die optische Auswerteeinheit 20 befindet sich oberhalb eines äußeren Randes des Sensorelements 3. Die Auswerteeinheit 20 ist dabei so eingerichtet, dass sie den Normalabstand zum Sensorelement 3 erfasst. Ist das Sensorelement 3 von der (mit durchgezogenen Linien veranschaulichten) Ruheposition in eine (mit strichlierten Linien veranschaulichte) Messposition ausgelenkt, verändert sich der Abstand zur Auswerteeinheit 20. Aus dieser Abstandsänderung kann in weiterer Folge die Stärke des elektrischen Feldes 13 berechnet werden. Zur Messung des Abstands kann beispielsweise eine interferometrische Anordnung verwendet werden.

Fig. 9b zeigt einen Sensor 1 mit einer anderen optischen Auswerteeinheit 20, welche aus einem Sender 21 und einem Empfänger 22 besteht. Vom Sender 21 wird unter einem bestimmten Winkel 23 ein Laserstrahl 24 auf das Sensorelement 3 gerichtet. Der Laserstrahl 24 wird vom Sensorelement 3 reflektiert und von einem Empfangsgerät aufgenommen. Das Empfangsgerät liefert ein Signal, das vom Ort abhängt, an dem der reflektierte Laserstrahl 25 auf den Empfänger 22 auftrifft. Durch eine Auslenkung des Sensorelements 3 ändert sich nun der Reflexionswinkel 26, unter welchem der Laserstrahl 24 reflektiert wird und damit der vom Empfänger 22 gemessene Ort. Dadurch kann die Stärke des zu messenden elektrischen Feldes 13 bestimmt werden.

Patentansprüche:

1. Sensor (1) zum Messen einer elektrischen Feldstärke eines elektrischen Feldes (13), aufweisend:

ein Basiselement (2),

ein Sensorelement (3) mit zumindest einem elektrischen Leiter (5), wobei das Sensorelement (3) durch die Wirkung des elektrischen Feldes (13) auf den elektrischen Leiter (5) von einer Ruheposition in eine Messposition auslenkbar ist,

gekennzeichnet durch

ein Gegenelement (4) mit zumindest einem elektrisch leitfähigen Kopplungsbereich (7), welcher zur kapazitiven Kopplung mit einem Kopplungsabschnitt (6) des elektrischen Leiters (5) am Sensorelement (3) mit einer Spannungsquelle (10a), insbesondere einer Wechselstrom-Spannungsquelle, verbunden ist,

wobei sich der elektrisch leitfähige Kopplungsbereich (7) am Gegenelement (4) im Ruhezustand des Sensorelements (3) benachbart des Kopplungsabschnitts (6) des elektrischen Leiters (5) am Sensorelement (3) erstreckt.

2. Sensor (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Kopplungsbereich (7) am Gegenelement (4) im Wesentlichen parallel zum Kopplungsabschnitt (6) des elektrischen Leiters (5) am Sensorelement (3) erstreckt.

3. Sensor (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopplungsbereich (7) am Gegenelement (4) und der Kopplungsabschnitt (6) am Sensorelement (3) eine Interdigitalstruktur ausbilden.

4. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenelement (4) in der Ruheposition des Sensorelements (3) im Wesentlichen in derselben Ebene wie das Sensorelement (3) angeordnet ist.

5. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenelement (4) in der Ruheposition des Sensorelements (3) im Wesentlichen parallel und in einem Normalabstand zu dem Sensorelement (3) angeordnet ist.

6. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (3) an zwei gegenüberliegenden Enden mit dem Basiselement (2) verbunden ist.

7. Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Ende des Sensorelements (3) mit dem Basiselement (2) verbunden ist, wobei das andere Ende des Sensorelements (3) frei auskragt.

8. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (3) eine T-, U- oder balkenförmige Grundform aufweist, wobei an der T-, U- oder balkenförmigen Grundform eine Interdigitalstruktur ausgebildet sein kann.

9. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenelement (4) einteilig mit dem Basiselement (2) ausgebildet ist.

10. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenelement (4) beweglich am Basiselement (2) gelagert ist.

11. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (3) zwei elektrische Leiter (5) und das Gegenelement (4) zwei elektrisch leitfähige Kopplungsbereiche (7) aufweist, wobei sich die Kopplungsbereiche (7) am Gegenelement (4) benachbart der Kopplungsabschnitte (6) der elektrischen Leiter (5) am Sensorelement (3) erstrecken.

12. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Leiter (5) am Sensorelement (3) mit einer weiteren Spannungsquelle (10b), insbesondere einer Wechselstrom-Spannungsquelle, verbunden ist.

13. Sensor (1) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (3) zwei elektrische Leiter (5) aufweist, welche mit weiteren Spannungsquellen (10b) unterschiedlichen Vorzeichens verbunden sind.

14. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungsquelle (10a) dazu eingerichtet ist, eine Ladung im elektrischen Leiter (5) des Sensorelements (3) durch Influenz einzuprägen.

15. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vakuumeinheit zur Anordnung des Sensorelements (3) und des Gegenelements (4) in einem Vakuum vorgesehen ist.

16. Sensor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit (20) zur Erfassung der Auslenkung des Sensorelements (3) in der Messposition (3a) vorgesehen ist, wobei die Auswerteeinheit (20) bevorzugt zur optischen, piezoelektrischen, piezoresistiven, resistiven oder kapazitiven Erfassung der Auslenkung des Sensorelements (3) eingerichtet ist.

17. Verfahren zum Messen einer elektrischen Feldstärke eines elektrischen Feldes (13), mit den Schritten:

Anordnen eines Sensors (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16,

Auslenken des Sensorelements (3) durch die Wirkung des elektrischen Feldes (13) auf den elektrischen Leiter (5) von der Ruhelageposition in die Messposition, und

Erfassen der Auslenkung des Sensorelements (3) in der Messposition.

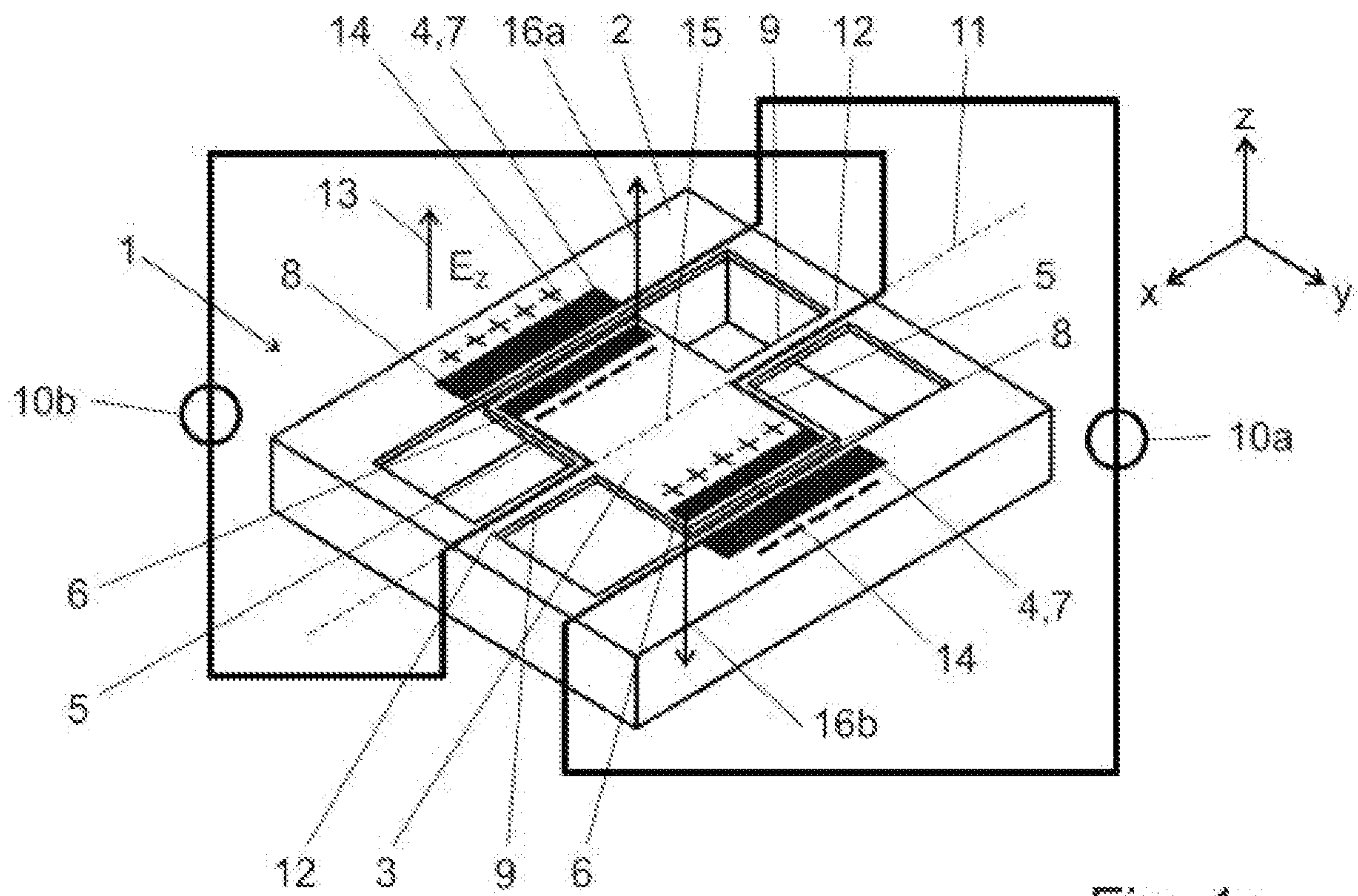


Fig. 1a

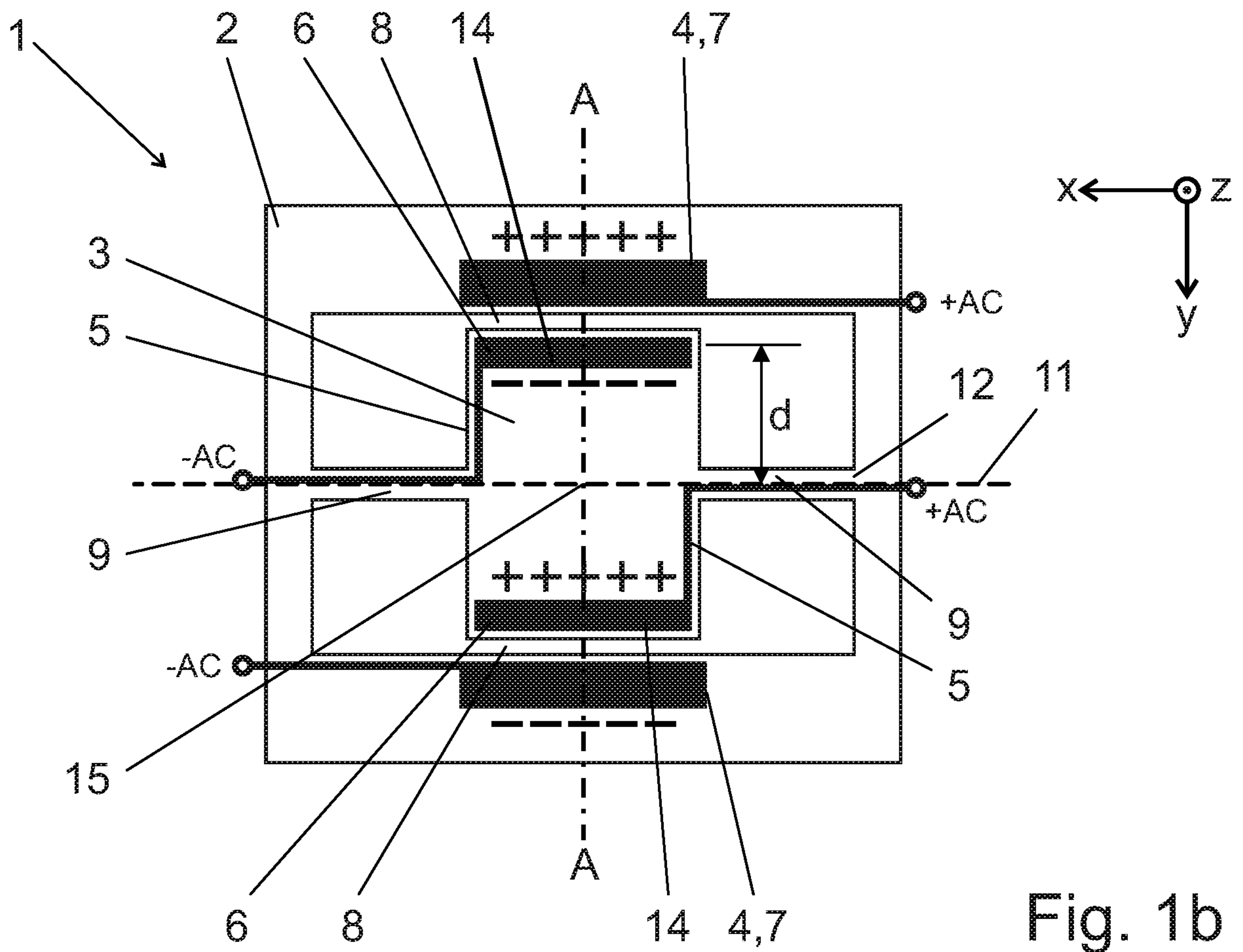


Fig. 1b

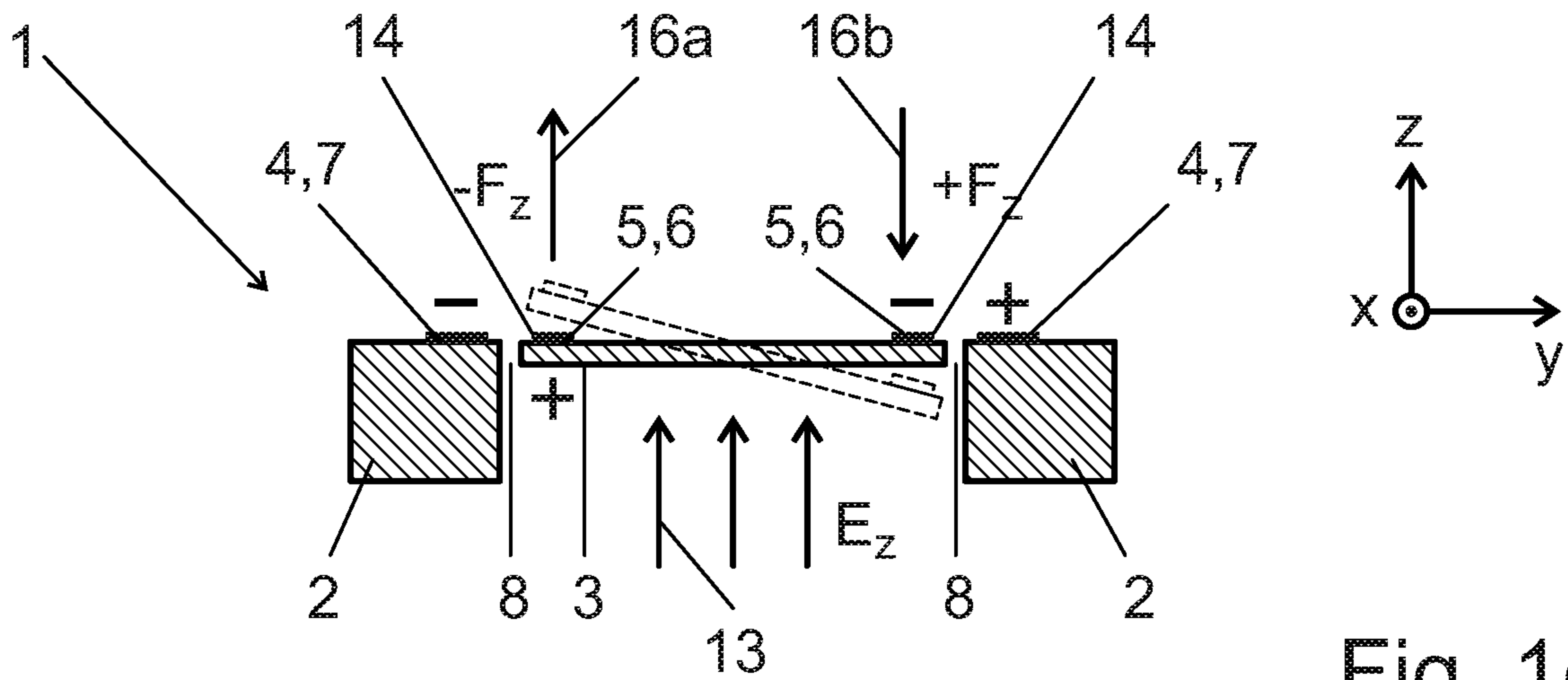


Fig. 1c

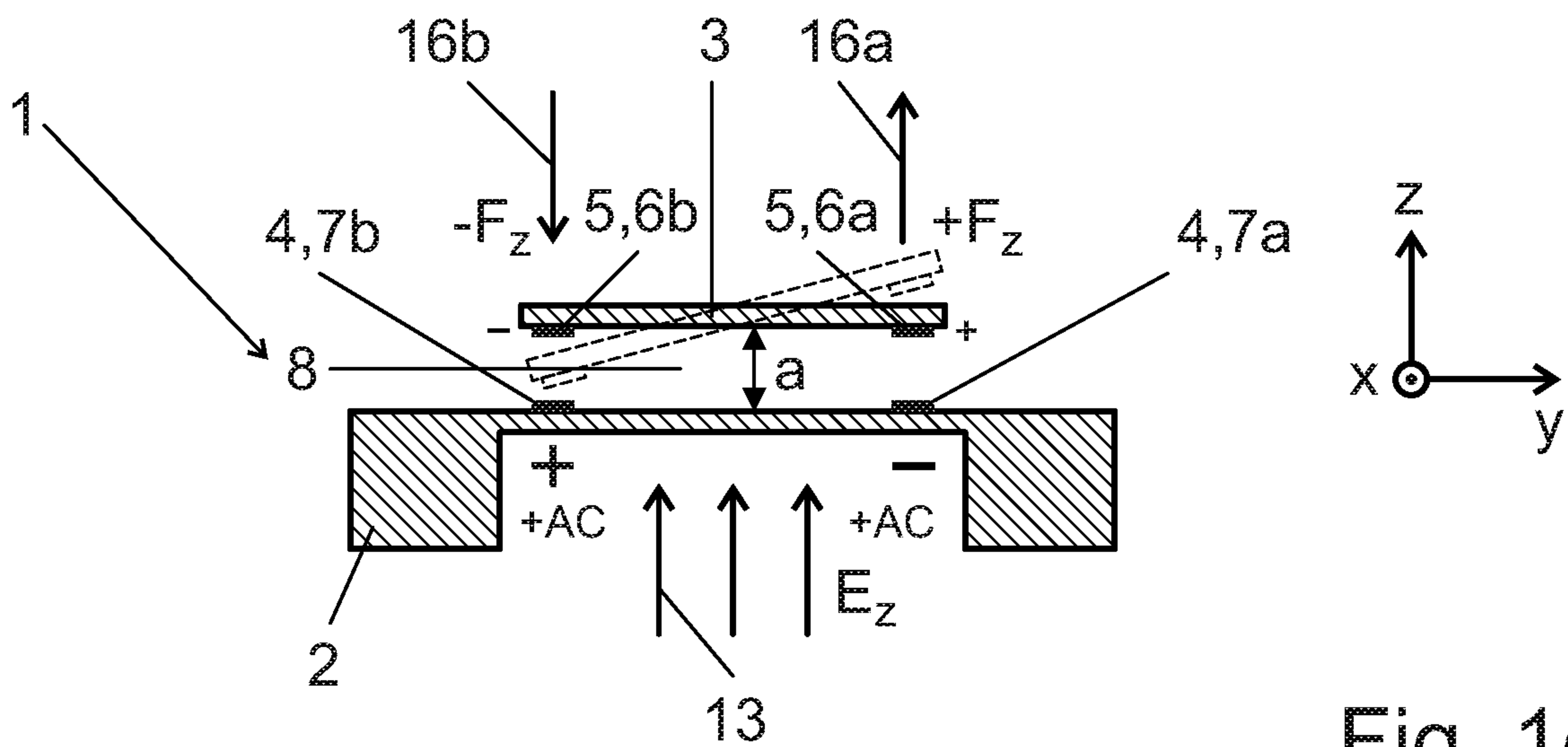
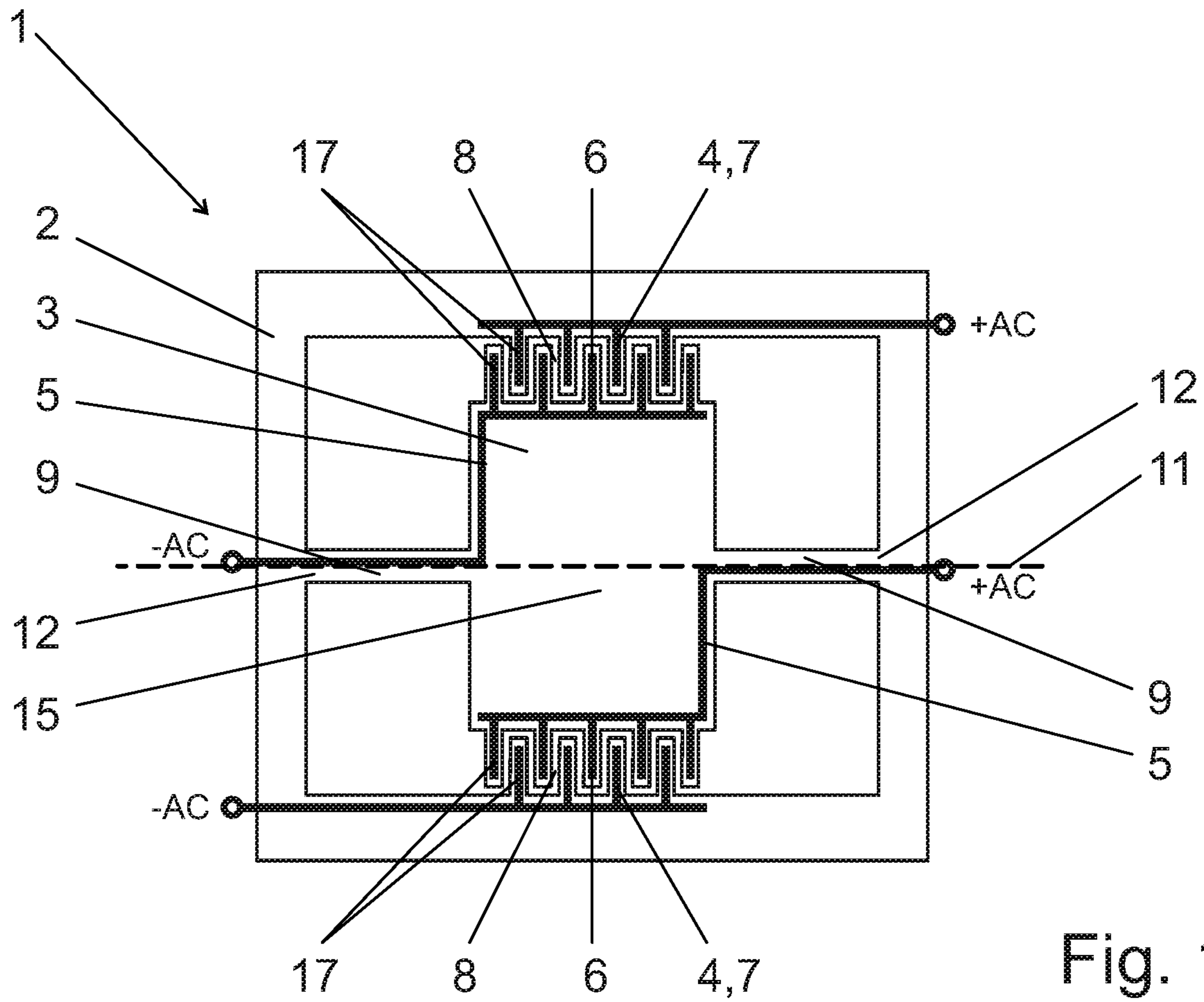


Fig. 1d



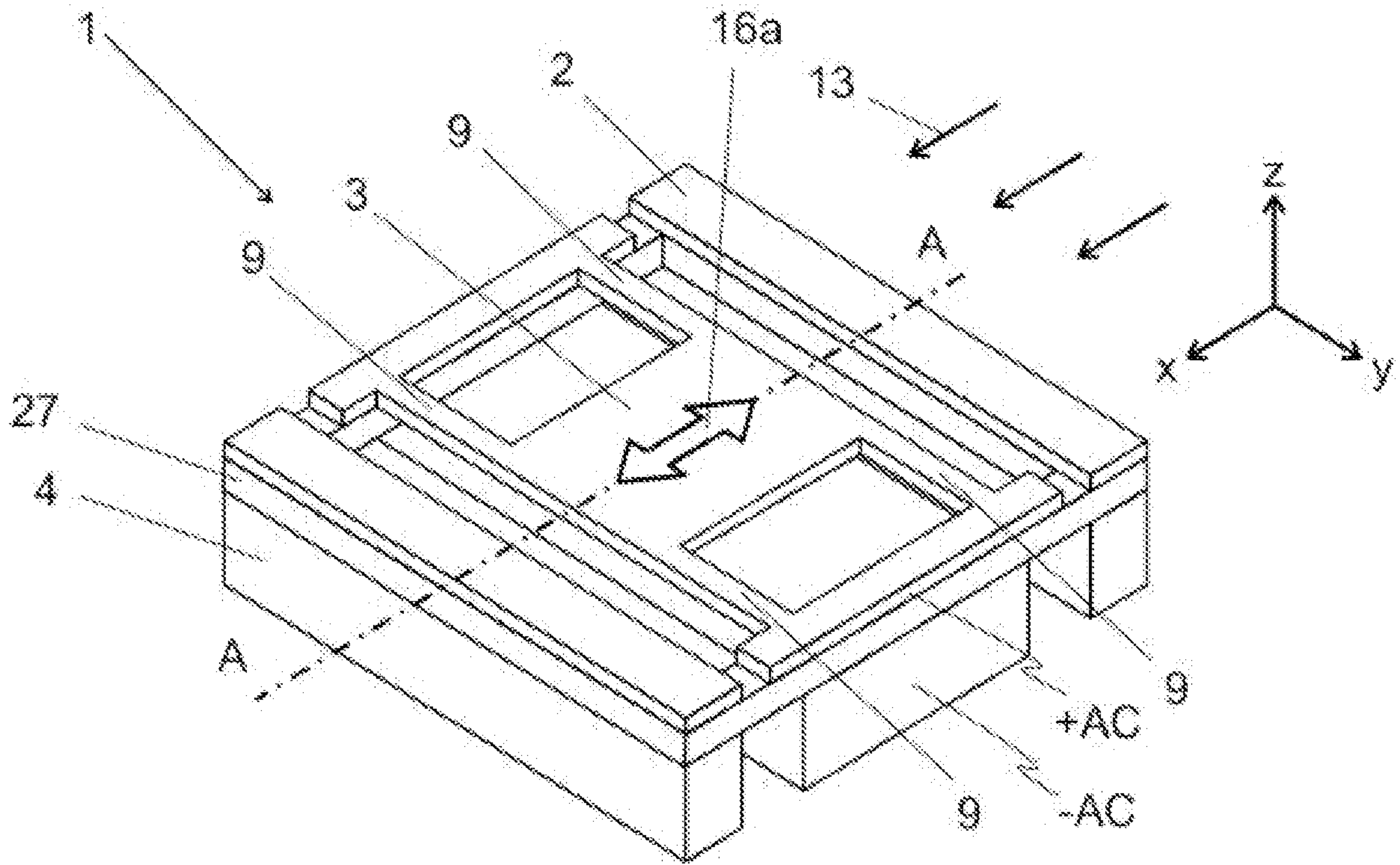


Fig. 1f

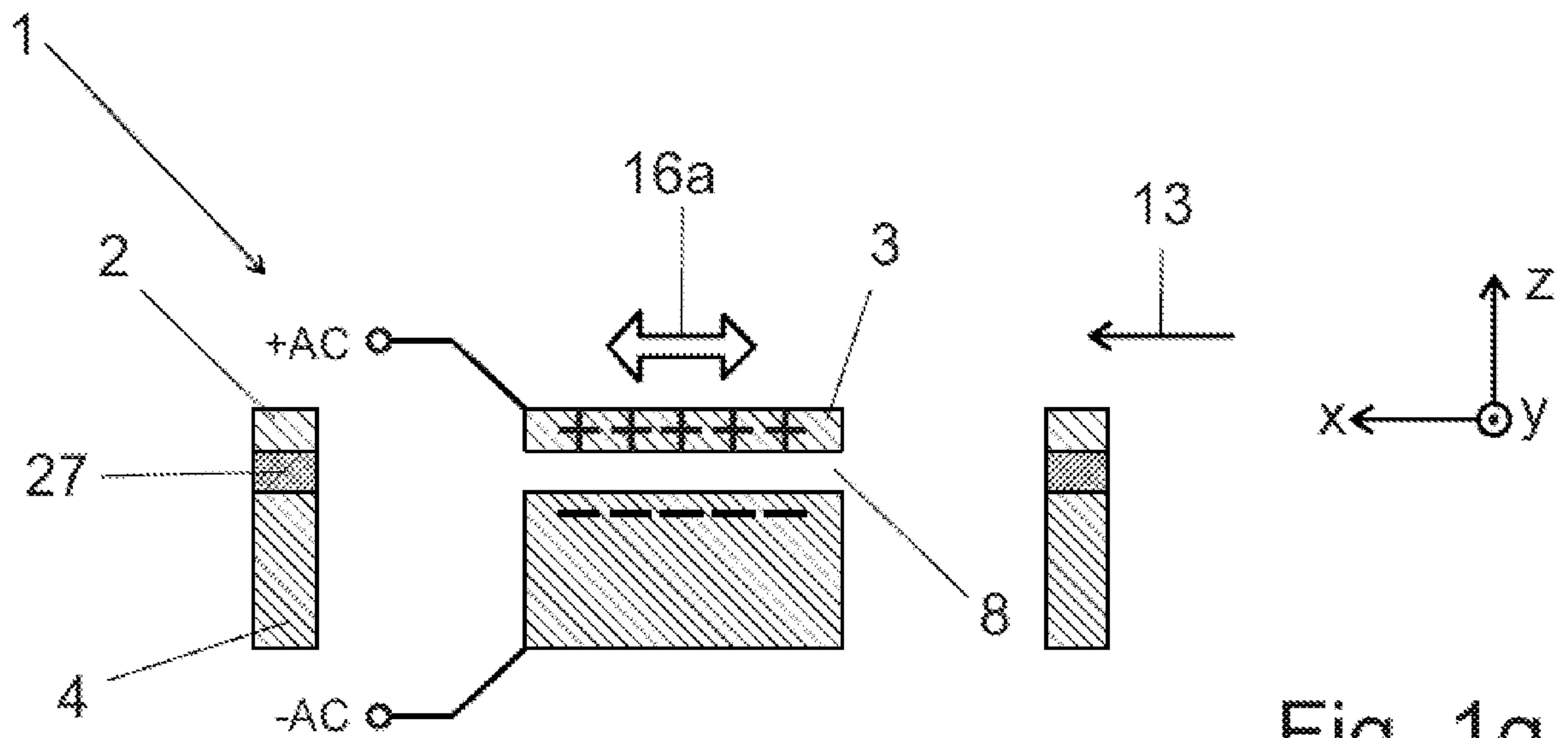


Fig. 1g

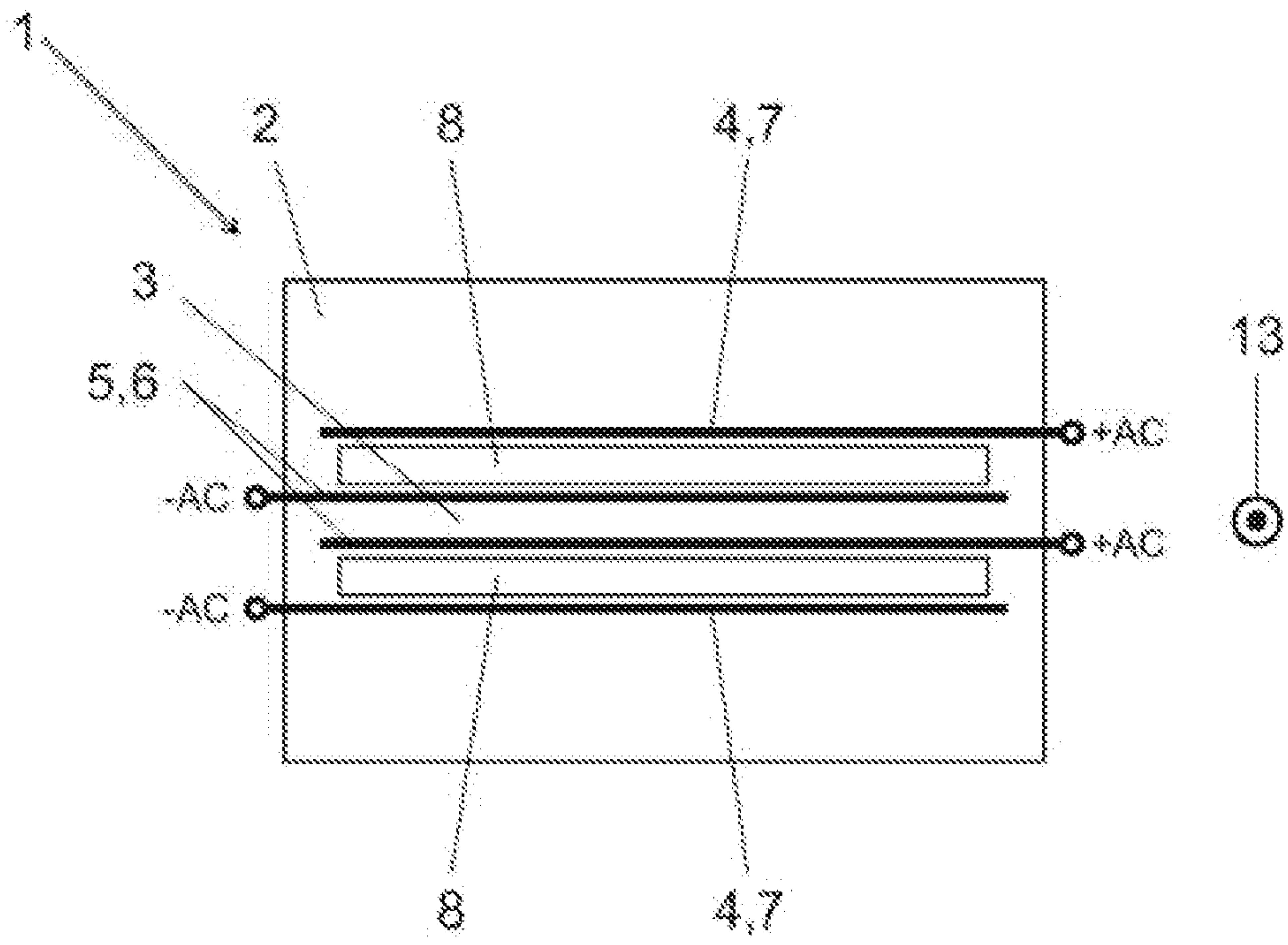


Fig. 2a

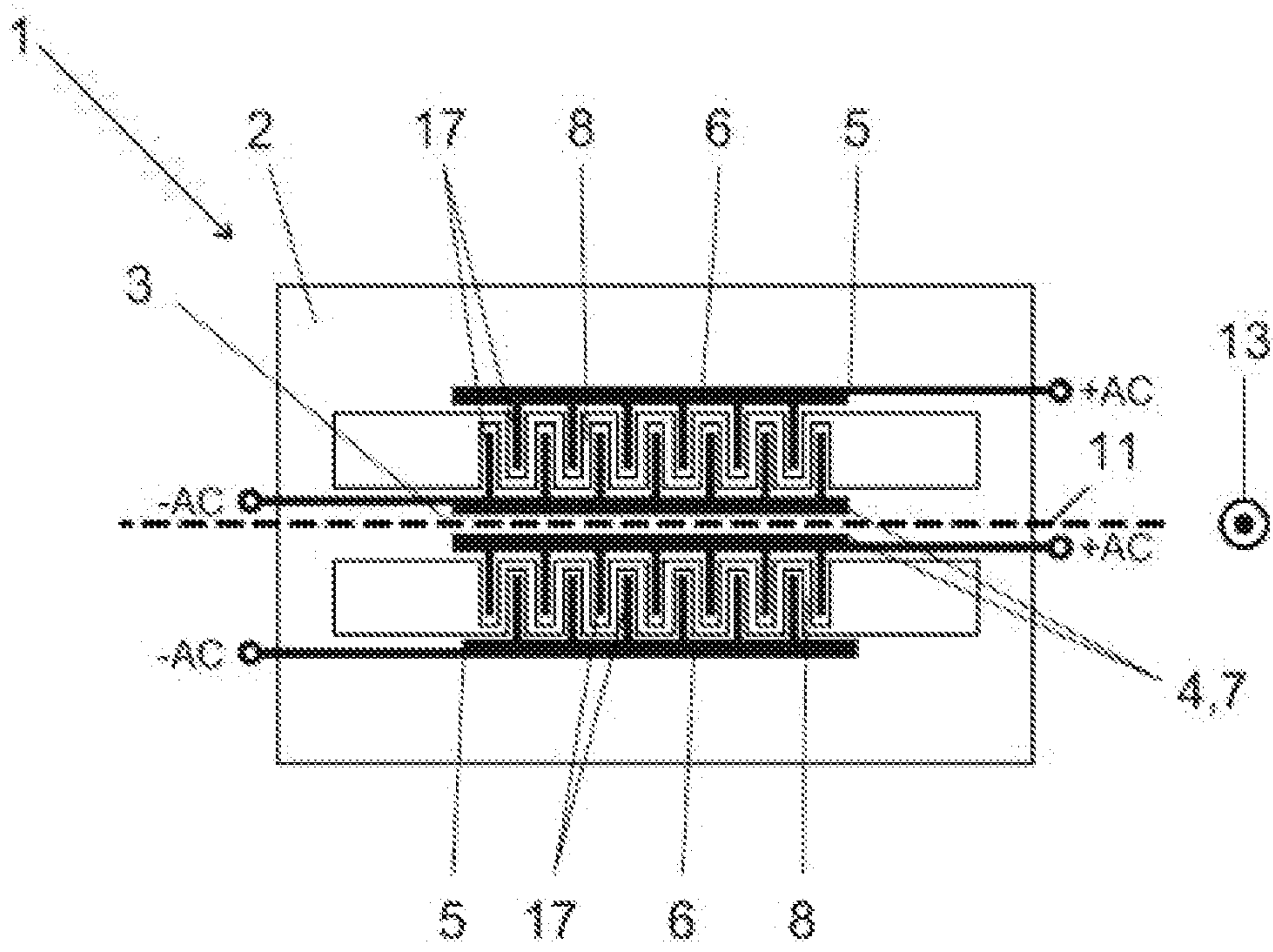


Fig. 2b

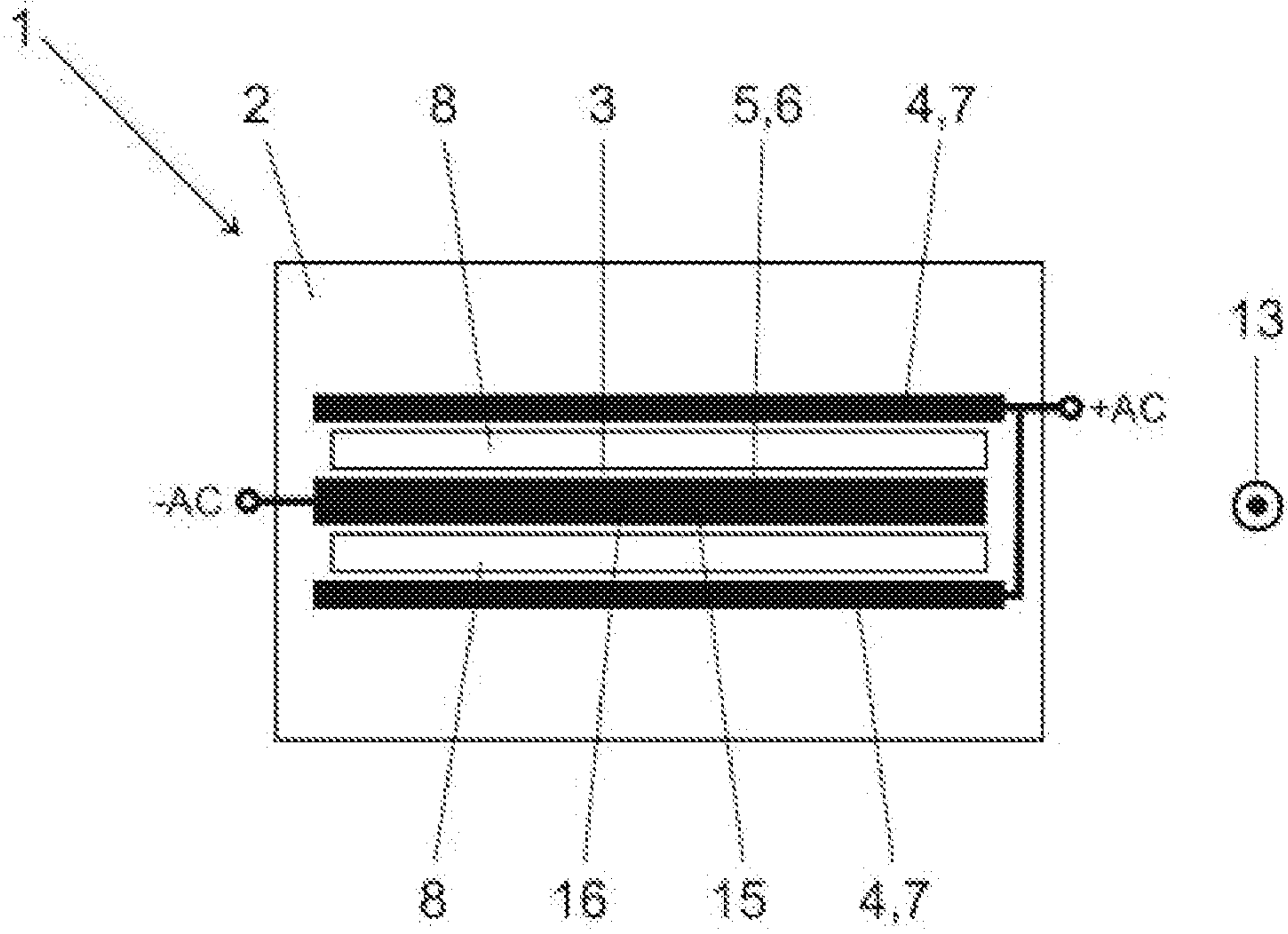


Fig. 3a

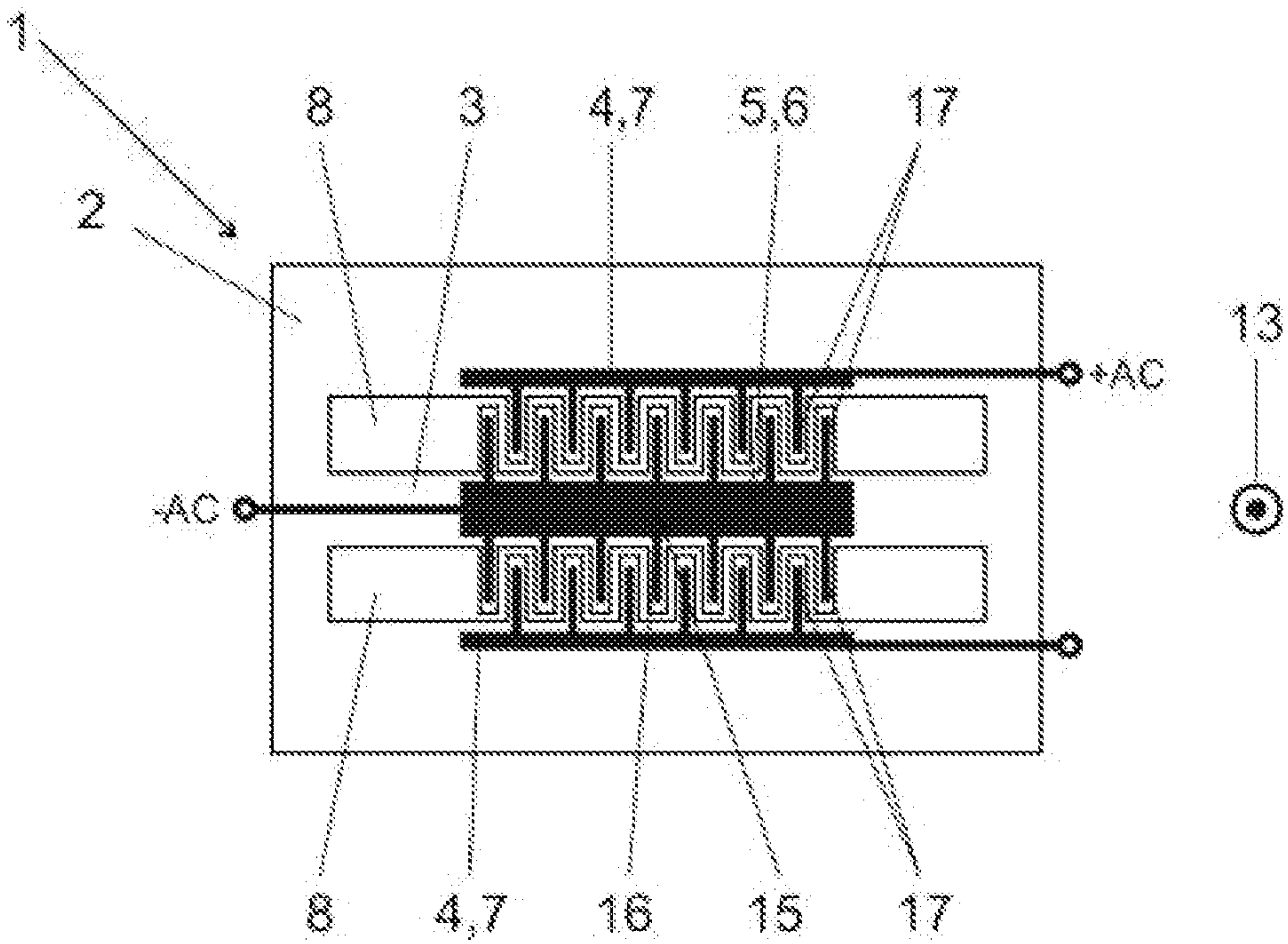


Fig. 3b

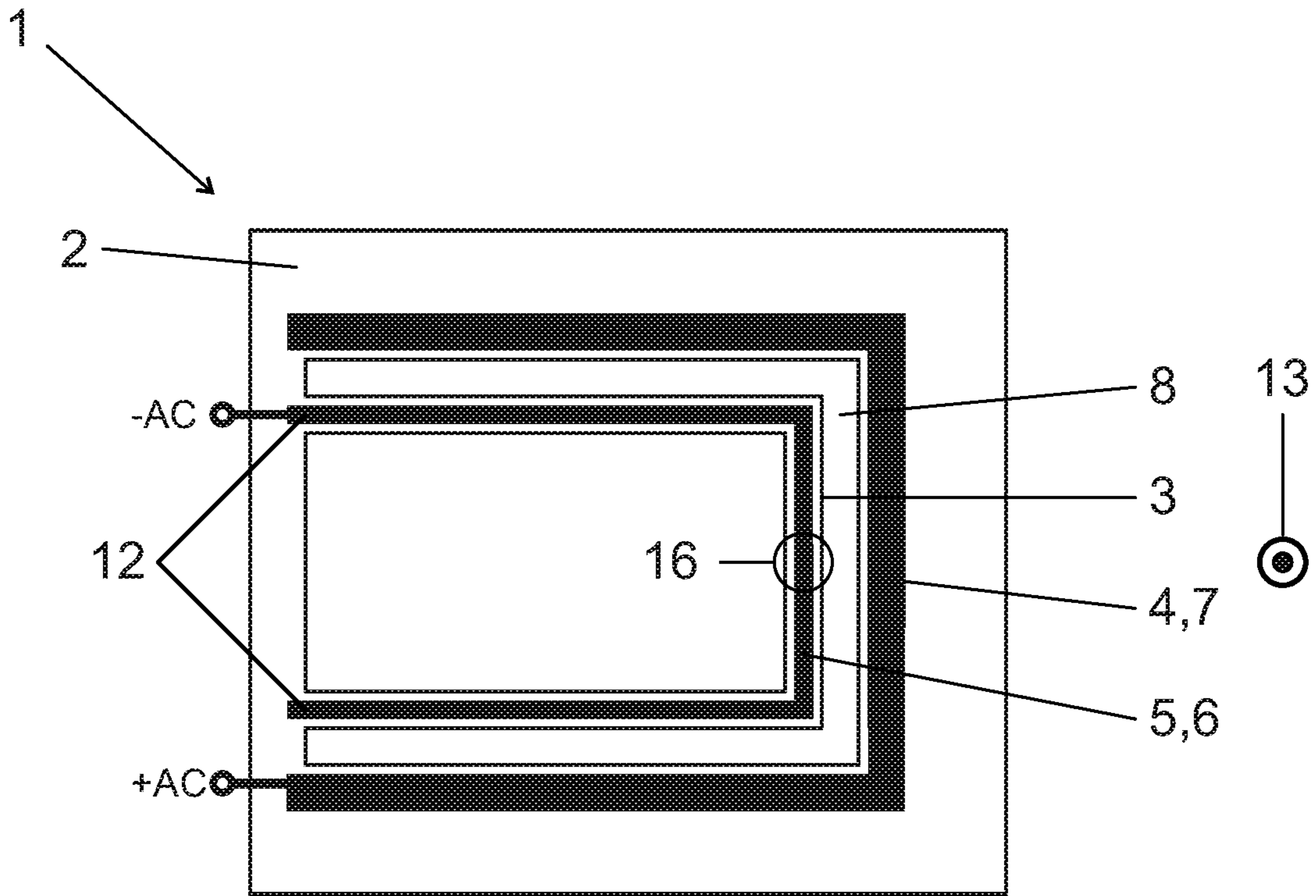


Fig. 4a

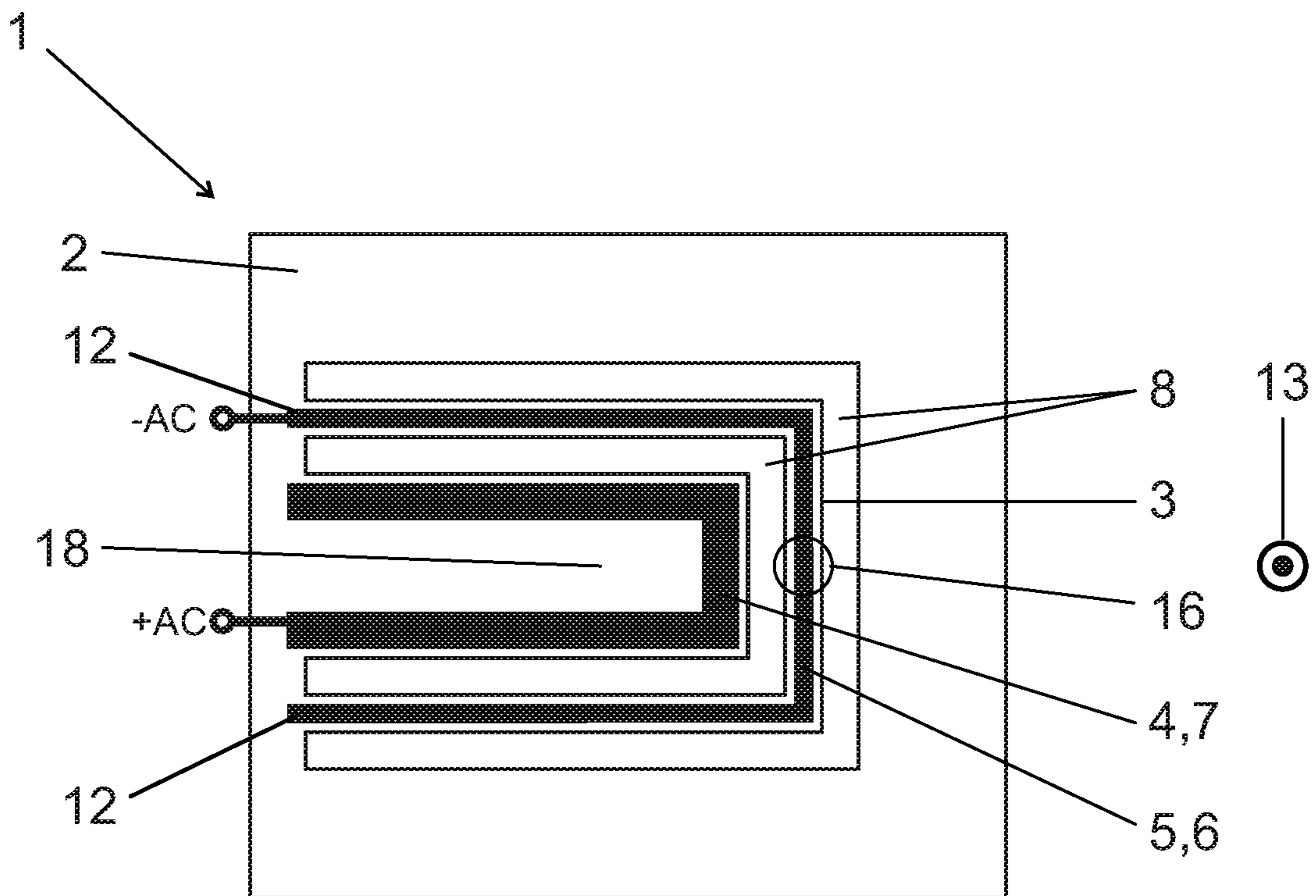


Fig. 4b

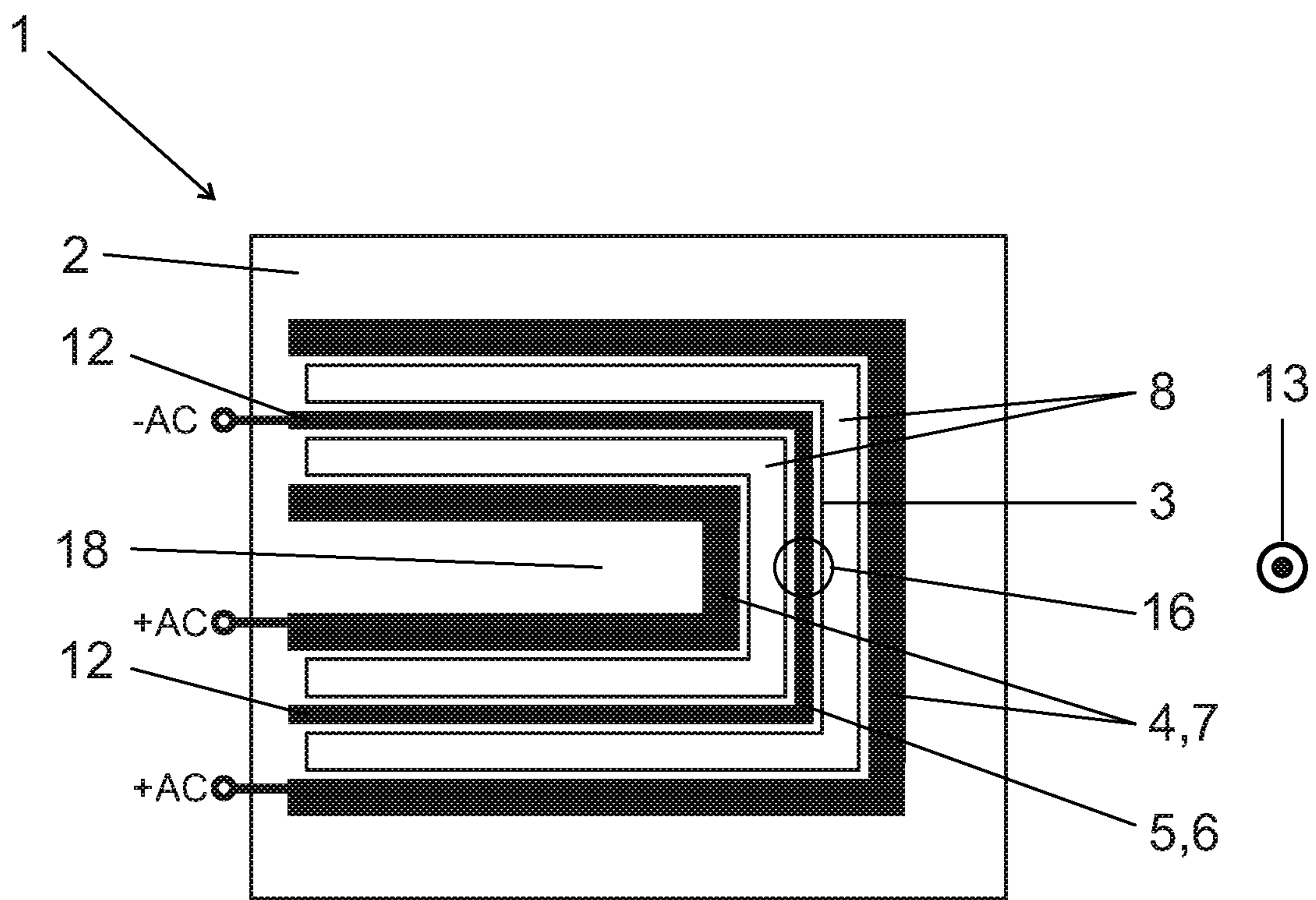


Fig. 4c

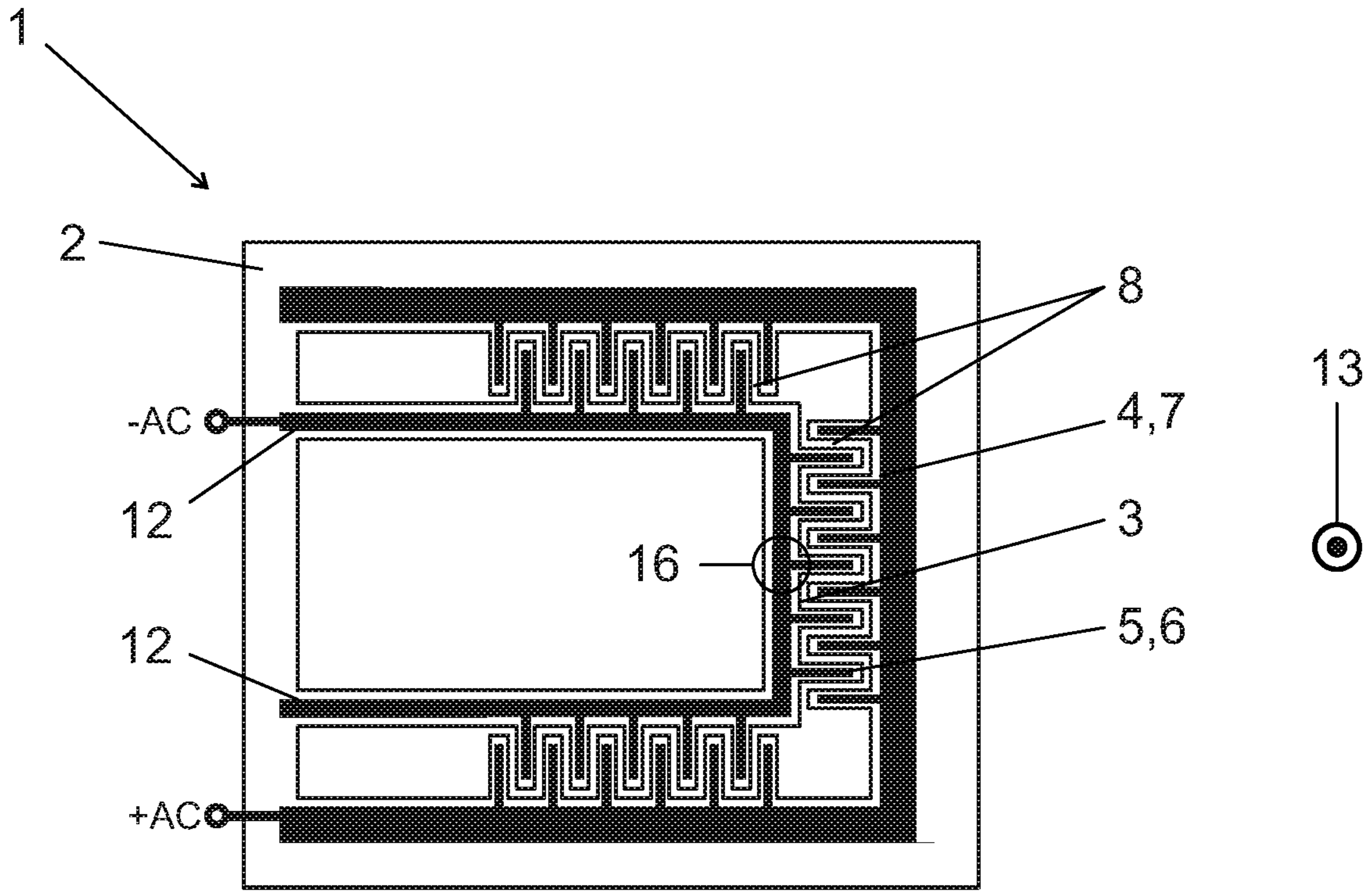


Fig. 5a

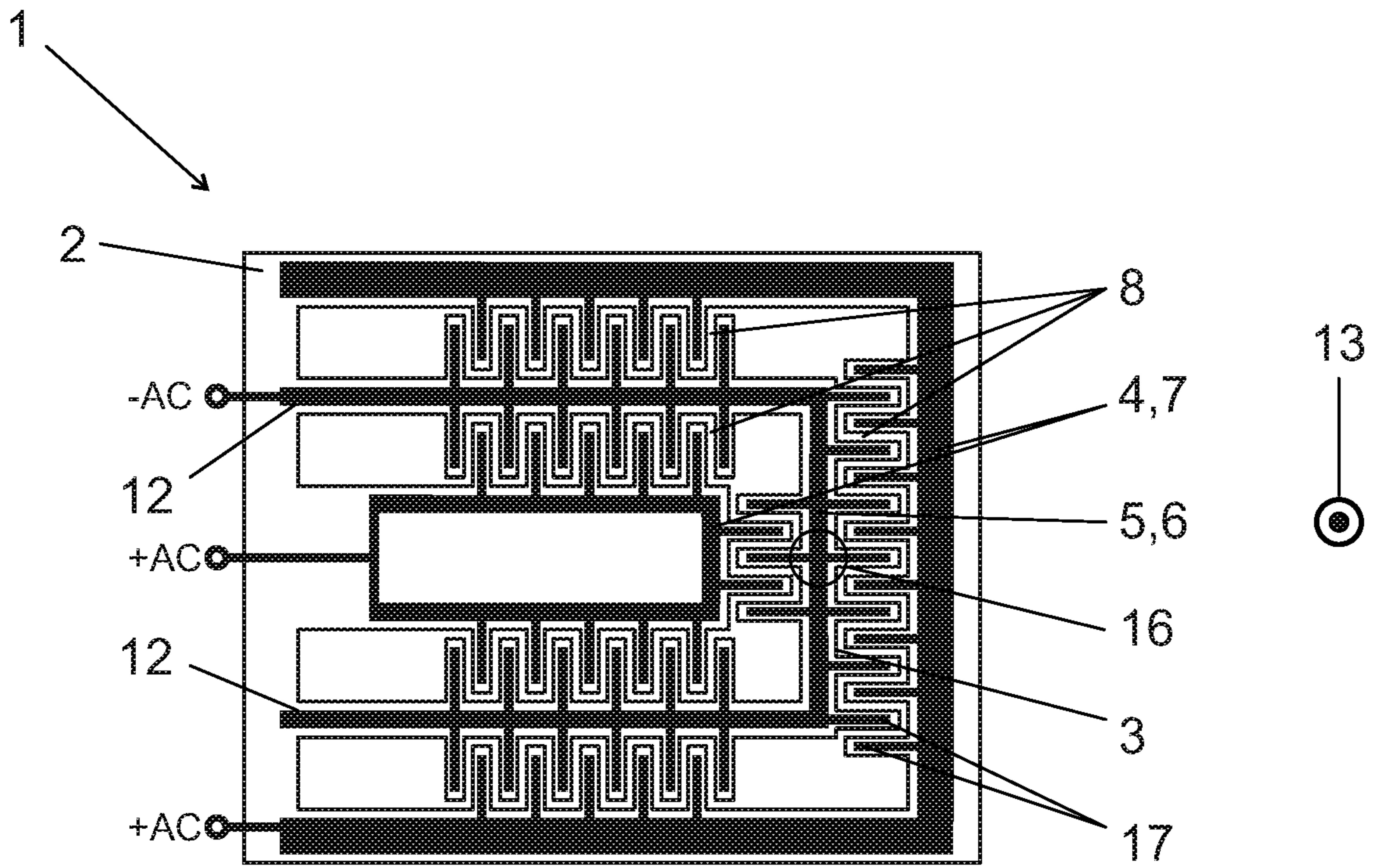


Fig. 5b

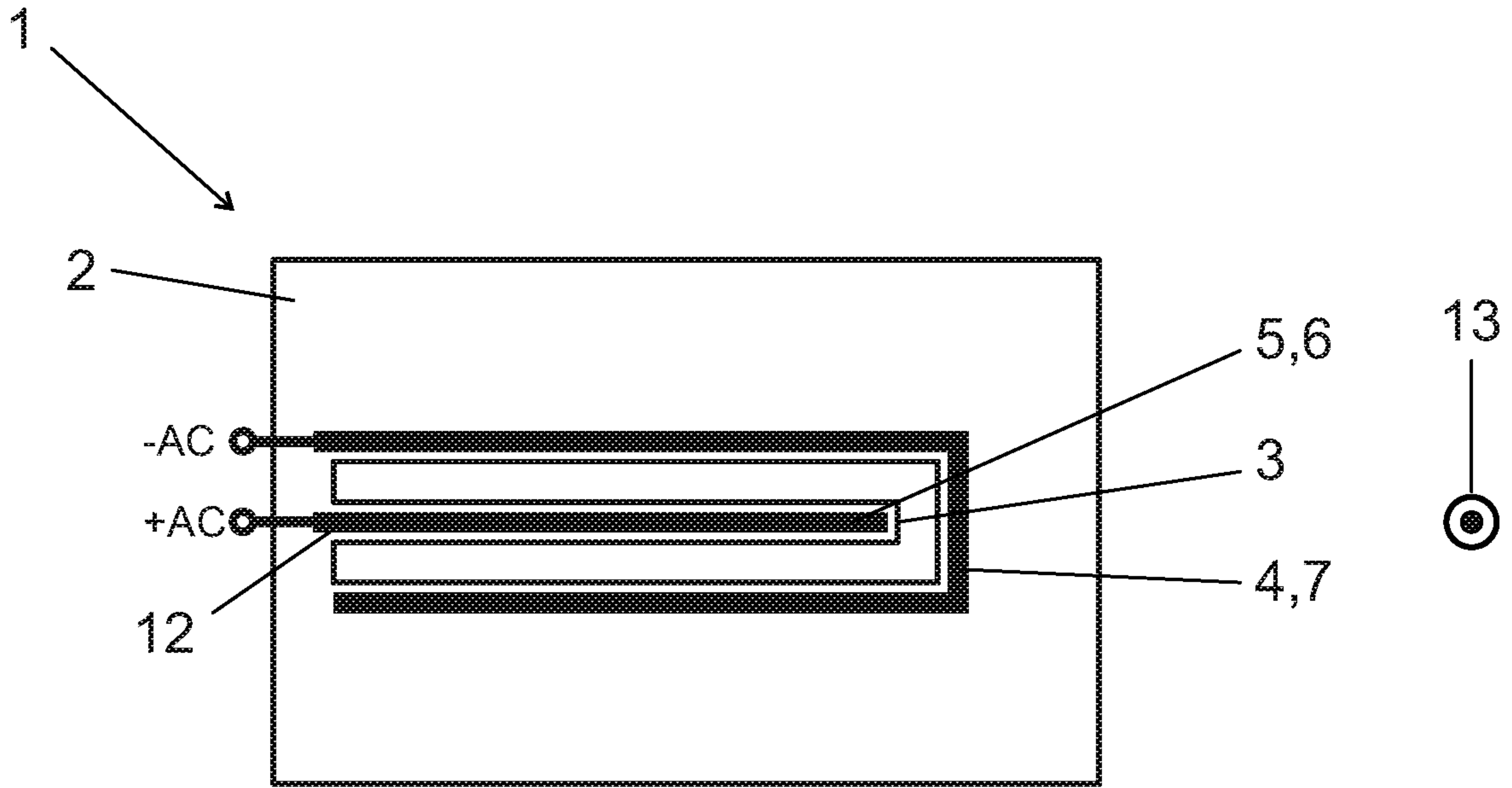


Fig. 6a

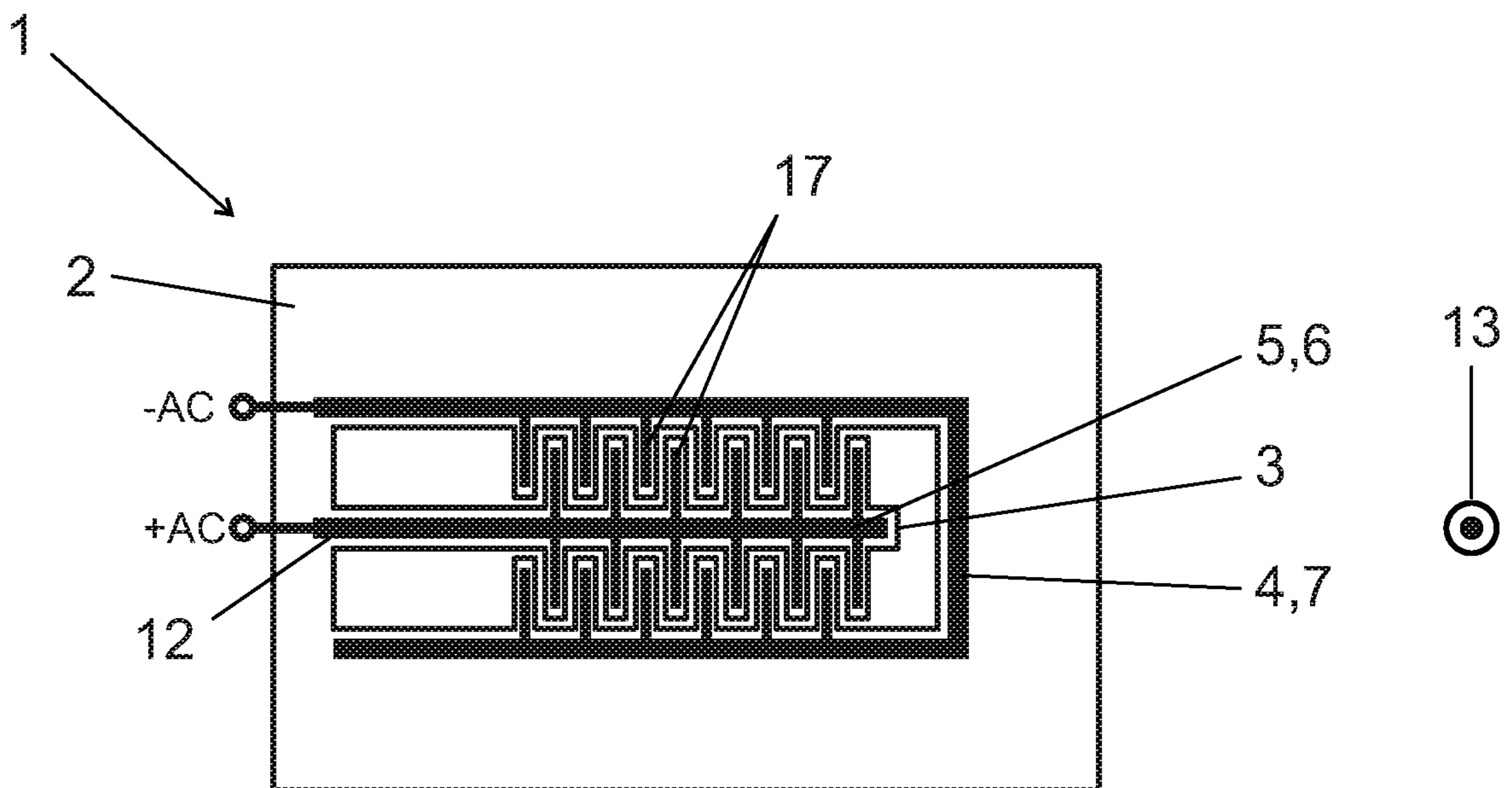


Fig. 6b

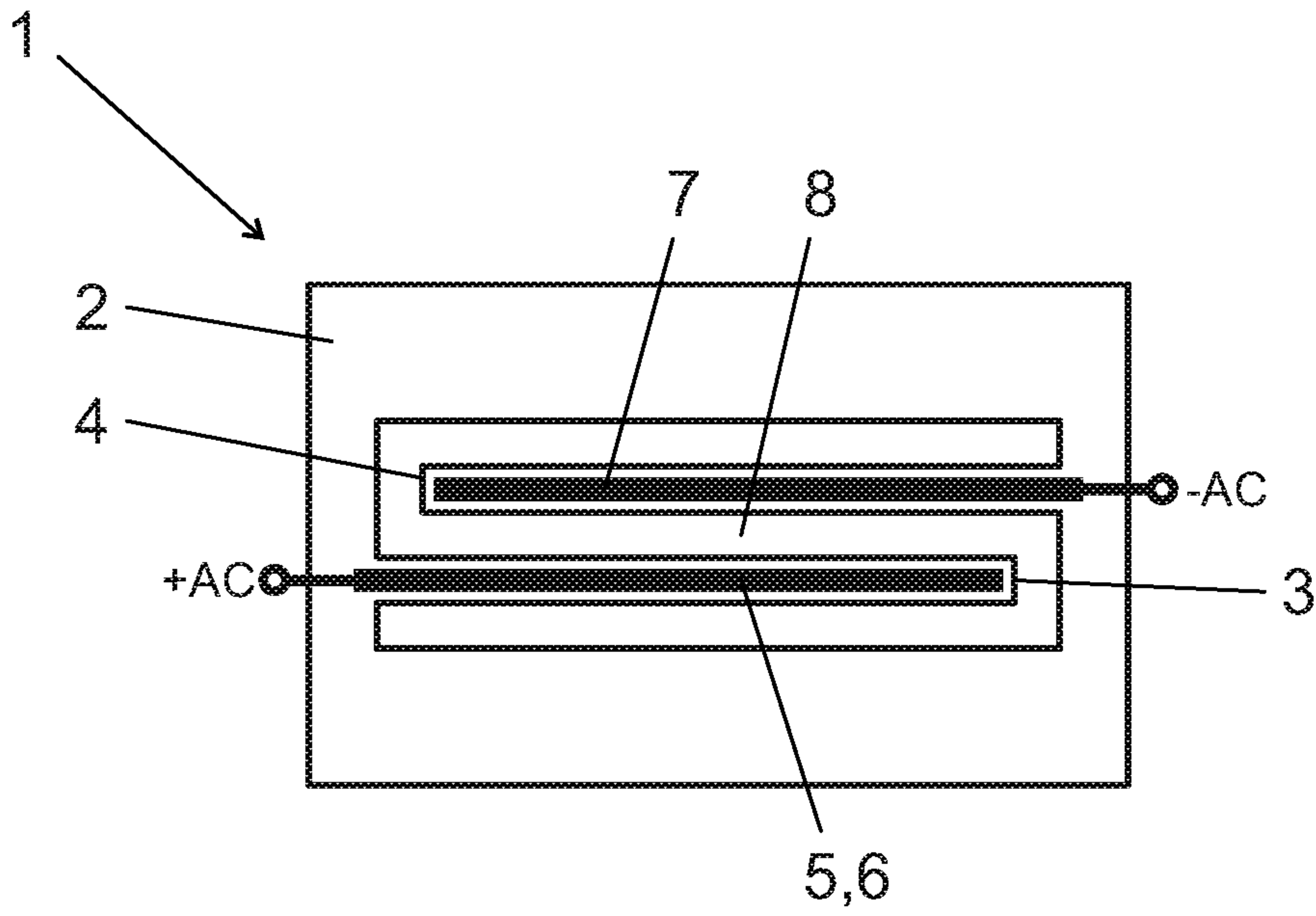


Fig. 7a

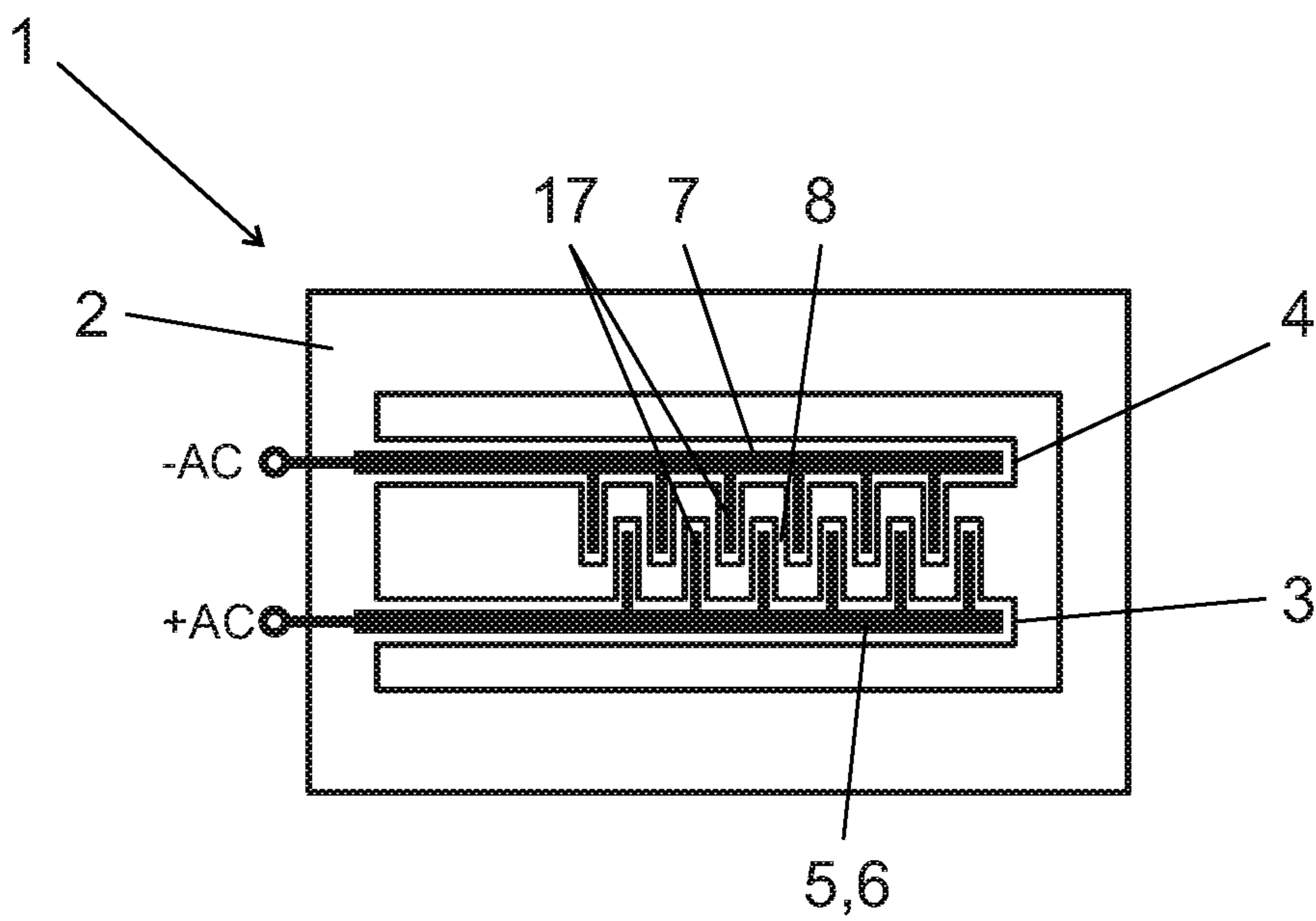


Fig. 7b

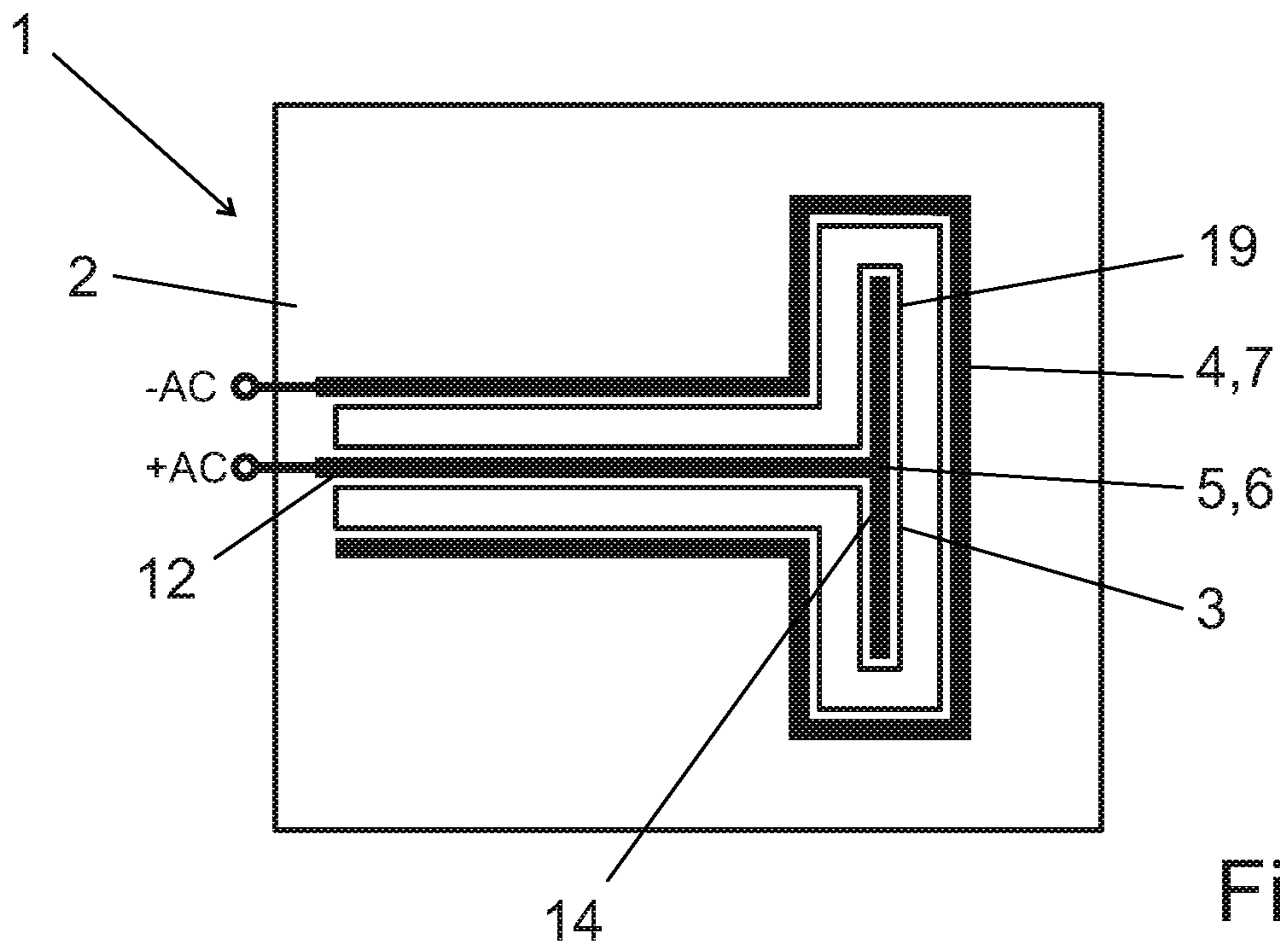


Fig. 8a

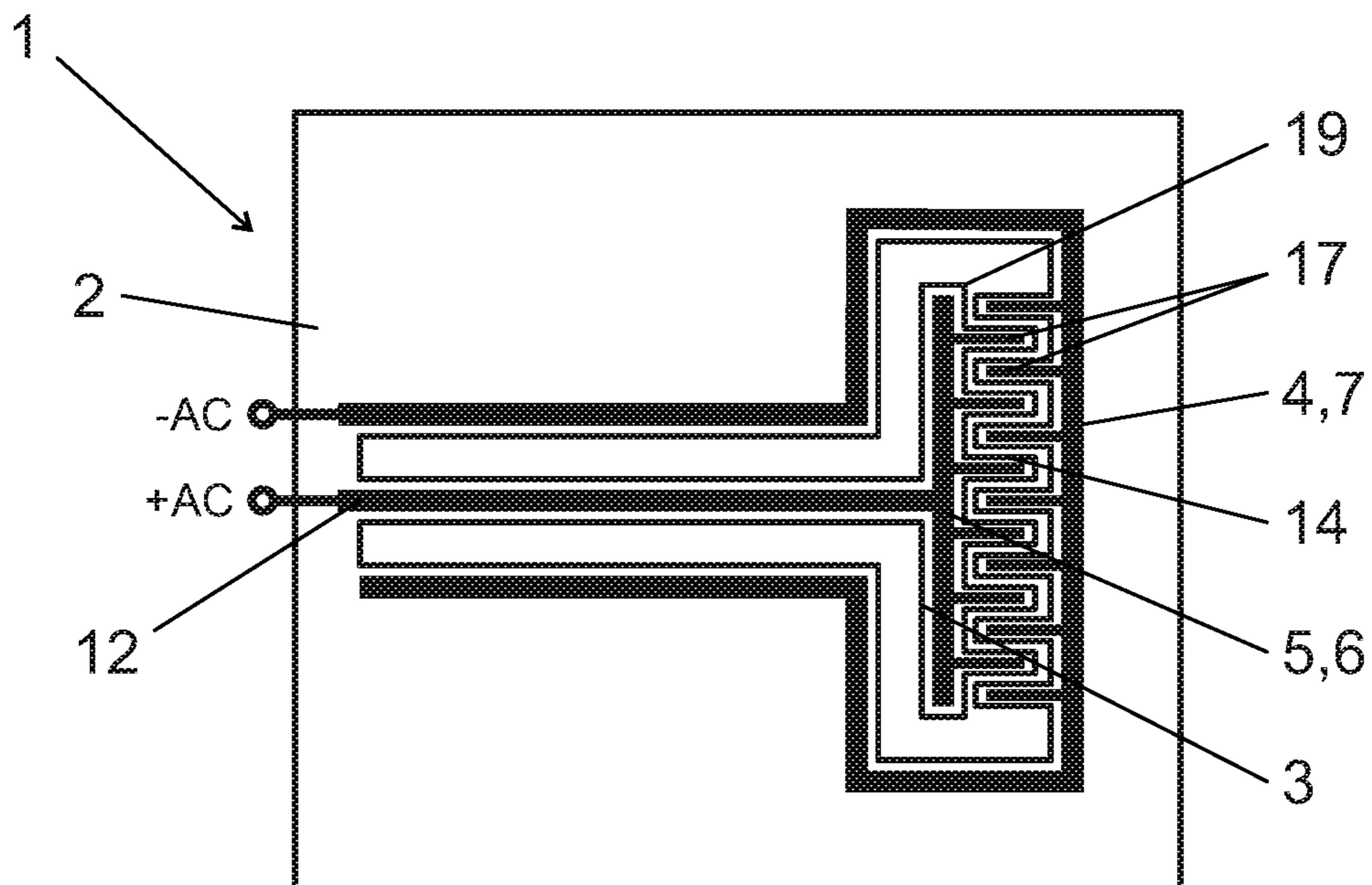


Fig. 8b

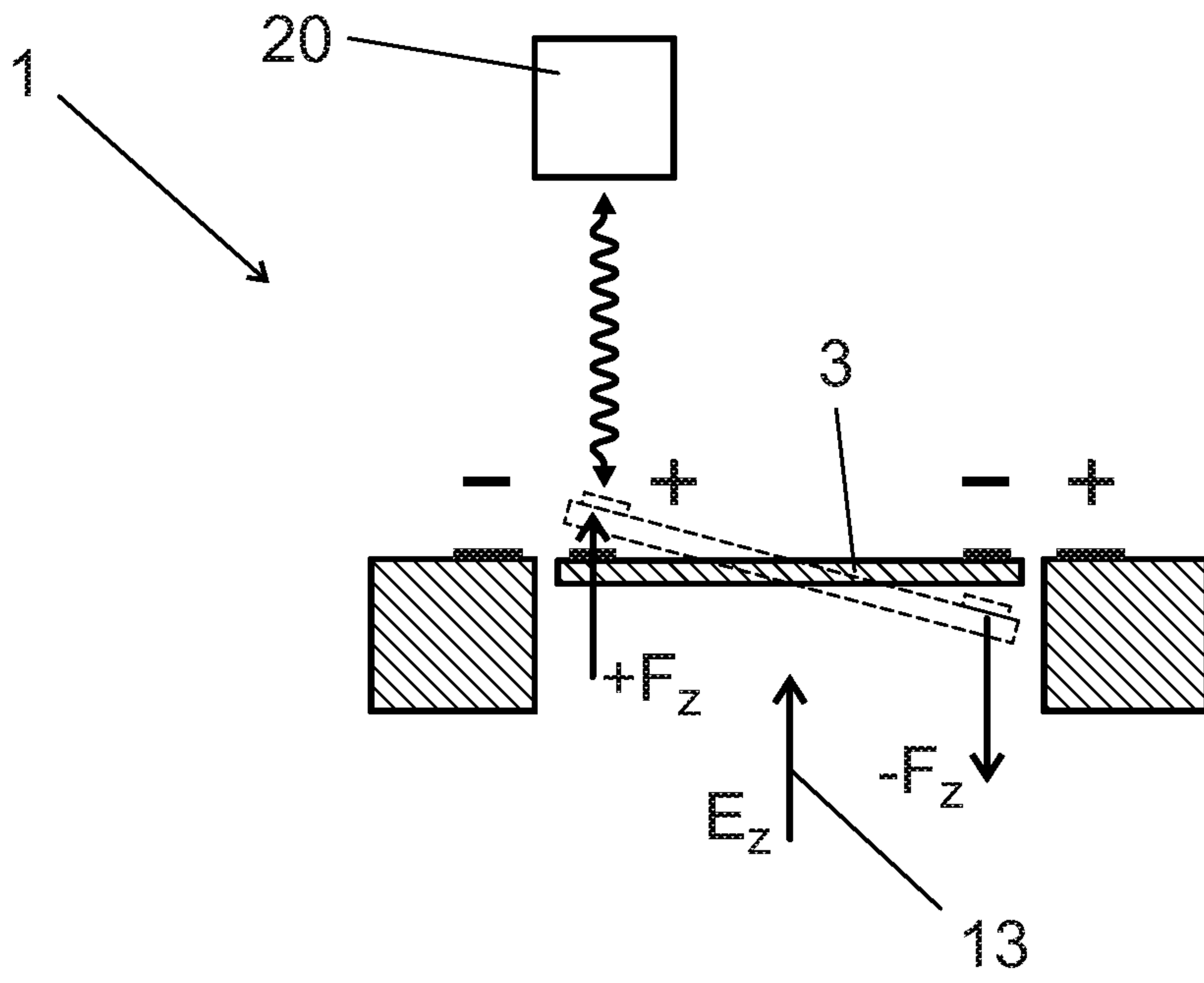


Fig. 9a

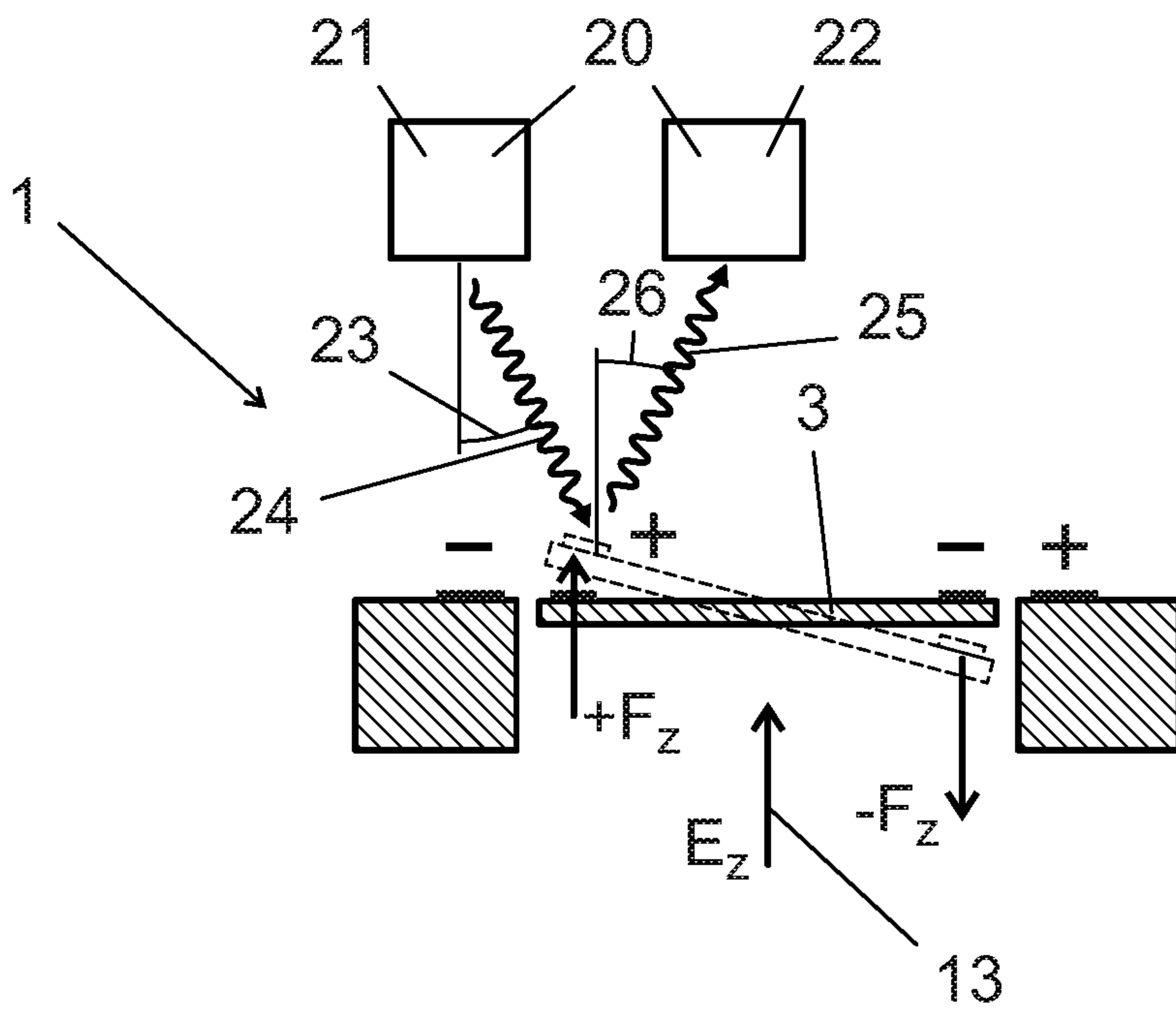


Fig. 9b

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/AT2020/060478

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>G01R 29/12</i> (2006.01)i; <i>B81B 7/02</i> (2006.01)i; <i>G01R 29/08</i> (2006.01)n; <i>G02B 26/08</i> (2006.01)n		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
G01R; B82B; B81B; G02B		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1569023 A1 (FUJITSU LTD [JP]; FUJITSU MEDIA DEVICES LTD [JP]) 31 August 2005 (2005-08-31) paragraph [0045] - paragraphs [0053], [0056]; figures 1,2,6,7,18,19 paragraphs [0001], [0008], [0009], [0022], [0037], [0039]	1-6,8-14
X	WO 2019120795 A1 (DONAU UNIV KREMS [AT]) 27 June 2019 (2019-06-27)	1,2,4,6-8,16,17
Y	page 22, line 26 - page 25, line 27; figures 1,2 page 5, line 19 - line 25	15
Y	US 2019137555 A1 (SHAIFAI CYRUS [CA] ET AL) 09 May 2019 (2019-05-09)	15
A	paragraphs [0002], [0014] - paragraphs [0017], [0043], [0053], [0057], [0062]; figures 1,3	1,12,13
A	CN 103675481 B (CHINESE ACAD INST ELECTRONICS) 15 June 2016 (2016-06-15) abstract; figure 1	1-17
A	CN 108508284 A (INST ELECTRONICS CAS; BEIJING ZHONGKE FEILONG SENSING TECH CO LTD) 07 September 2018 (2018-09-07) abstract; figures 1-6	1-17
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
22 February 2021		03 March 2021
Name and mailing address of the ISA/EP		Authorized officer
European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Hof, Klaus-Dieter Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/AT2020/060478

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
EP	1569023	A1	31 August 2005	AU	2002335243	A1	04 May 2004
				CN	1685270	A	19 October 2005
				EP	1569023	A1	31 August 2005
				JP	4550578	B2	22 September 2010
				JP	WO2004034126	A1	09 February 2006
				TW	575737	B	11 February 2004
				US	2005200986	A1	15 September 2005
				US	2008285108	A1	20 November 2008
				WO	2004034126	A1	22 April 2004

WO	2019120795	A1	27 June 2019	AT	520811	A1	15 July 2019
				CN	111656202	A	11 September 2020
				EP	3729113	A1	28 October 2020
				US	2020355735	A1	12 November 2020
				WO	2019120795	A1	27 June 2019

US	2019137555	A1	09 May 2019	CA	3022581	A1	09 May 2019
				US	2019137555	A1	09 May 2019

CN	103675481	B	15 June 2016	NONE			

CN	108508284	A	07 September 2018	NONE			

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. G01R29/12 B81B7/02
 ADD. G01R29/08 G02B26/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 G01R B82B B81B G02B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 1 569 023 A1 (FUJITSU LTD [JP]; FUJITSU MEDIA DEVICES LTD [JP]) 31. August 2005 (2005-08-31) Absatz [0045] - Absätze [0053], [0056]; Abbildungen 1,2,6,7,18,19 Absätze [0001], [0008], [0009], [0022], [0037], [0039] -----	1-6,8-14
X	WO 2019/120795 A1 (DONAU UNIV KREMS [AT]) 27. Juni 2019 (2019-06-27)	1,2,4, 6-8,16, 17
Y	Seite 22, Zeile 26 - Seite 25, Zeile 27; Abbildungen 1,2 Seite 5, Zeile 19 - Zeile 25 ----- -/-	15



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 2021

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/03/2021

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hof, Klaus-Dieter

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 2019/137555 A1 (SHAIFAI CYRUS [CA] ET AL) 9. Mai 2019 (2019-05-09)	15
A	Absätze [0002], [0014] - Absätze [0017], [0043], [0053], [0057], [0062]; Abbildungen 1,3	1,12,13
A	----- CN 103 675 481 B (CHINESE ACAD INST ELECTRONICS) 15. Juni 2016 (2016-06-15) Zusammenfassung; Abbildung 1	1-17
A	----- CN 108 508 284 A (INST ELECTRONICS CAS; BEIJING ZHONGKE FEILONG SENSING TECH CO LTD) 7. September 2018 (2018-09-07) Zusammenfassung; Abbildungen 1-6 -----	1-17

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT2020/060478

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1569023	A1	31-08-2005	AU 2002335243 A1 04-05-2004
			CN 1685270 A 19-10-2005
			EP 1569023 A1 31-08-2005
			JP 4550578 B2 22-09-2010
			JP WO2004034126 A1 09-02-2006
			TW 575737 B 11-02-2004
			US 2005200986 A1 15-09-2005
			US 2008285108 A1 20-11-2008
			WO 2004034126 A1 22-04-2004

WO 2019120795	A1	27-06-2019	AT 520811 A1 15-07-2019
			CN 111656202 A 11-09-2020
			EP 3729113 A1 28-10-2020
			US 2020355735 A1 12-11-2020
			WO 2019120795 A1 27-06-2019

US 2019137555	A1	09-05-2019	CA 3022581 A1 09-05-2019
			US 2019137555 A1 09-05-2019

CN 103675481	B	15-06-2016	KEINE

CN 108508284	A	07-09-2018	KEINE
